## 東北大学マイクロシステム融合研究開発センター 試作コインランドリ 主要装置リスト (2025年4月~)

- ■施設使用料(1人あたり) 学外:600円/時間、学内:430円/時間
- ■技術支援料 6,514円/時間 (文科省マテリアル先端リサーチインフラ【ARIM】ご利用の場合、3,300円/時間) (改定前と同じ)

<b>–</b> 12	ער אר ניויו	<u></u>	,,514円/時間 (文科省マテリ 		4274				改定前と同 (税込)		
分類	番号	ARIM 機器ID	装置名称	メーカ/型番	ARIM データ提供あり 使用料 (円/時間)	ARIM データ提供なし 使用料 (円/時間)	非公開利用 使用料 (円/時間)	改定前 ARIM データ提供時 使用料	改定前 ARIM 使用料	対応ウェハサイズ	備考/簡単な仕様、装置の特徴等
			エッチングチャンバー	アズワン PSH1200	2,134	2,838	3,410			最大8インチ	酸洗浄、ウェットエッチング(Si, SiO2, 金属など)
			有機ドラフトチャンバー		2,112	2,816	3,388	2,068		最大6インチ	有機洗浄、レジスト剥離 SiNウェット エッチング
洗			リン酸槽 スピン乾燥機	 東邦化成 ZAA-4	2,486 3,212	3,300 4,268	3,960 5,126	2,398 3,102		最大8インチ 最大6インチ	SiNウェットエッチング 平置き式でウェハやフォトマスクの乾燥
净			4"スピン乾燥機	SEMITOOL PSC101	3,630					4インチ	カセット式で1度に25枚まで処理可能
乾			6"スピン乾燥機	SEMITOOL PSC101	3,630					6インチ	カセット式で1度に25枚まで処理可能
燥			シンター用オーブン	ヤマト科学 DR22	2,662	3,542	4,268			最大6インチ	N2雰囲気中での熱処理、Alシンタリングなど
	A-08	TU-008	真空オーブン	ヤマト科学 DP-31	1,782	2,376	-	1,716	2,134	最大8インチ	真空中での熱処理
	A-09	TU-009	ブラシスクラバ	全協化成 特注	7,436	9,900	11,880	7,392	9,240	最大6インチ	研磨後のウェバ洗浄
	B-01	TU-051	ミカサ スピンコータ	ミカサ 1H-DXII	2,882	3,828	4,598	2,904	3,608	最大4インチ	レジスト等のスピンコーティング
	B-02	TU-052	アクテス スピンコータ#1	アクテス ASC-4000	3,014	4,004	4,818	3,058	3,806	最大6インチ	レジスト等のスピンコーティング
			アクテス スピンコータ#2	アクテス ASC-4000W	3,058	4,070	4,884	3,080		最大8インチ	レジスト等のスピンコーティング
			ホットプレート	Shamal HHP-230SQ	1,716		2,750	1,760		最大8インチ	設定温度:40~400℃、温度分布精度:±1℃
			クリーンオーブン 両面アライナ #1	ヤマト科学 DE62 SUSS MA6/BA6	4,026	5,346 5,544	6,424 6,666	3,850 4,136		最大8インチ	ウェハのベーク コンタクト露光、片面・両面アライメント、接合時のアライメント
			両面アライナ #2	SUSS MA6/BA6	4,158 4,158	5,544	6,666	4,136		最大6インチ	コンタクト露光、片面・両面アライメント、接合時のアライメント
			レーザ描画装置	Heidelberg Instruments	-	-	,	9,526	•	最大9インチ角	波長:405nm、最小描画線幅:0.7µm、マスク作製(Cr、エマルジョン)、直接描画、グレイ
	D-00	10-037	レーリ油画衣庫   	DWL2000CE Heidelberg Instruments	9,240	12,320	14,784	9,320	11,902	取八列ファ戸	スケール露光 キー・405ヵ~275ヵ~ 是小塔面線幅・1.0~ ファクル制(Cr. エフリジョン) ・ 超点速度
	B-09	TU-058	マスクレスアライナ	MLA150	6,314	8,404	10,098	6,534	8,162	最大8インチ角	波長:405nm 375nm、最小描画線幅:1µm、マスク作製(Cr、エマルジョン)、超高速直接描画、裏面アライメント
リソ	B-10	TU-059	スプレー現像装置	アクテス ADE-3000S	2,860	3,806	4,576	2,838	3,542	最大6インチ	現像液とリンス(水)をノズルから噴霧
_	B-11	TU-060	現像ドラフト		2,112	2,816	3,388	2,112	2,618	最大6インチ	レジスト現像用のドラフトチャンバー
フフ	B-12	TU-061	スピン乾燥機	東邦化成 ZAA-4	2,904	3,850	4,620	2,904	3,630	最大6インチ	平置き式でウェハやフォトマスクの乾燥
イ	B-13	TU-062	コータデベロッパ	Suss ACS200Gen3	12,364	16,478	19,778	12,826	16,016	最大8インチ	2~8インチ、HMDS処理、コート 3ライン、現像 2ライン、エッジリンス、バックリンス、ホットプレート 4セット、クールプレート 1セット
	B-14	TU-063	i線ステッパ	キヤノン FPA-3030i5+	21,252	28,314	47,960	22,000	27,500	最大8インチ	小片~8インチ、最小線幅 0.35µm以下、重ね合せ精度 40nm、両面アライメント対応、透明
			エリオニクス 130kV EB描画装置	Tリオ <sup>ー</sup> クス FI S-G125S	10,164	·	16,236	10,560		最大6インチ	基板対応、反り基板対応、Nikonレチクル対応 最大加速電圧:130keV、最小描画パターン:10nm以下
				エリオニクス ELS-7500X	4,378	5,830	6,996	4,554		最大4インチ	最大加速電圧:50keV
			ポリイミドキュア炉	ヤマト科学 DN43H	2,574	3,432	4,136	2,486		最大8インチ	N2雰囲気中でのポリイミドのキュア
			UV キュア装置	ウシオ電機 UMA-802	4,774	6,358	7,634	4,774		4インチ	レジストのキュア、カセットtoカセット
	B-19	TU-068	   球面露光装置	東栄科学産業 -	4,532	6,028	7,238	4,686	5,852	球面体	球面体(直径1.0、3.3mm)へのマスクレス露光、最小パターン:1.5µmハーフピッチ、アライメ
			両面アライナ #3	SUSS MA8/BA8 Gen3	5,368	•	8,580	5,368	6 688	<u></u> 最大6インチ	ント精度:±5μm コンタクト露光、片面・両面アライメント
				JOSS MAO DAO GCHS	·	, l	·		-	дулоту	
			BEAMER PC		1,826	2,420	2,904	1,936	2,420		近接補正用ソフト(BEAMER)
			酸化炉 (半導体)	東京エレクトロン XL-7	13,530	-	21,648	13,464	16,808	最大6インチ	酸化膜形成、半導体ウェ八用
酸			酸化炉 (MEMS)	東京エレクトロン XL-7	10,802	14,388	17,270	10,736	-	最大6インチ	酸化膜形成、MEMSウェ八用
化拡			酸化炉(8")  tc#tv====(Ptc#tv=)	光洋サーモシステム MT-10×8-A	9,878	13,156	-	9,768		最大8インチ	酸化膜形成、8インチ用
散			拡散炉 (P拡散炉) 拡散炉 (P押し込み炉)	東京エレクトロン XL-7 東京エレクトロン XL-7	14,388		23,034	14,080		最大6インチ  最大6インチ	P拡散 (プリデポ用) P拡散 (ドライブイン用)
・ イ			拡散炉 (P押し込み炉) 拡散炉 (B拡散炉)	東京エレクトロン XL-7	13,662 13,816	18,194 18,414		13,288 13,376	,	最大61ファ  最大6インチ	B拡散(プリデポ用)
<b>オ</b>				東京エレクトロン XL-7	12,320			11,880			B拡散(ドライブイン用)
注			メタル拡散炉	光洋リンドバーグ Model270	9,702	12,914	-	9,284		最大4インチ	最高温度:1000℃、メタルや圧電基板等の多用途拡散
入			中電流イオン注入装置	日新イオン機器 NH-20SR	22,506	-	-	22,440	28,050	最大4インチ	最大加速電圧:180keV、最大電流:0.6mA、注入可能元素:P、B、カセットtoカセット
熱	C-10	TU-106	アニール炉	東京エレクトロン XL-7	12,100	16,126	19,360	11,726	14,652	最大6インチ	イオン注入後のアニール
処理	C-11	TU-107	ランプアニール装置	AG Associates AG4100	9,460	12,606	15,136	9,768	12,188	最大6インチ	最高温度:1100℃、昇温速度:100℃/sec、カセットtoカセット
	C-12	TU-108	水素アニール炉	オリジナル -	20,856	27,786	33,352	19,492	24,354	最大6インチ	最高温度:1100℃、クリーンな環境下での赤外線ランプ加熱、Si専用
	C-13	TU-109	真空アニール炉	真空理工 RHL-Pss98/98#	6,974	9,284	11,154	6,952	8,668	最大4インチ	真空中での熱処理(酸素、窒素雰囲気中の処理対応未確認)
			LPCVD (SiN)	システムサービス -	13,046	17,380	20,856	12,606		最大6インチ	SiN
			LPCVD (Poly-Si)	システムサービス -	17,578	-		16,984		最大6インチ	Poly-Si
				システムサービス -	14,872	19,822	23,804	14,784		最大6インチ	SiO2(NSG)、SiON
			熱CVD 住友精密PECVD	国際電気 - 住友精密工業 MPX-CVD	29,370 20,394	-	-	28,138 19,822		最大6インチ 最大8インチ	Epipoly-Si(non-doped, doped)、Poly-Si(non-doped, doped)、最高温度:1100℃ SiN、SiO2、最高温度:350℃、低応力SiN成膜
				住友精密工業 MPX-CVD	21,780	-				最大8インチ	TEOS SiO2、SiN、最高温度:350℃、低応力成膜
	D-07		SPPテクノロジーズ TFOS	SPPテクノロジーズ APX-Cetus	21,956	-	,	21,296		最大8インチ	TEOS SiO2、SiN、基板サイズ 小片~8インチ、最高温度 350℃、低応力SiN成膜
			PECVD	SPPテクプロジース APX-Cetus    日本生産技術研究所 VDS-	-		·	•			
	D-08	TU-156	JPEL PECVD	5600	14,058	18,722	22,484	13,992	17,468	最大6インチ	SiN、SiO2、バッチ式:4インチ×13枚、6インチ×8枚
			W-CVD	Applied Materials P-5000	11,770	15,686	18,832	11,792	14,740	4インチ	タングステン成膜
	D-10	TU-158	芝浦スパッタ装置(加熱型)	芝浦メカトロニクス CFS-4ESII	4,818	6,424	7,722	4,884		最大8インチ	基板ステージφ200mm、3インチターゲット×3、基板加熱形(最高300℃)
				l						ローヘハイ	#   F   T   T   T   T   T   T   T   T   T
	D-11		芝浦スパッタ装置(冷却型)	芝浦メカトロニクス CFS-4ESII	4,862	6,468	7,766	4,906	6,116	最大8インチ	基板ステージφ200mm、3インチターゲット×3、基板水冷形、リフトオフプロセス可
		TU-159	芝浦スパッタ装置(冷却型) 自動搬送 芝浦スパッタ装置	芝浦メカトロニクス CFS-4ESII 芝浦メカトロニクス!-Miller CFS- 4EP-LL	4,862 6,996		7,766 11,198	7,238	-	最大81ンナ 最大8インチ	量板ステーシΦ200mm、3インチターゲット×3、量板水冷形、リノトオノノロセス可 基板ステージφ220mm、3インチターゲット×4、基板加熱形(最高300℃)、ロードロック付、 自動搬送付
成	D-12	TU-159	自動搬送 芝浦スパッタ装置 自動搬送 芝浦スパッタ装置(冷却	芝浦メカトロニクス!-Miller CFS- 4EP-LL 芝浦メカトロニクス!-Miller CFS-		9,328	11,198	,	9,042		基板ステージφ220mm、3インチターゲット×4、基板加熱形(最高300℃)、ロードロック付、 自動搬送付 基板ステージφ220mm、3インチターゲット×4、基板冷却型、リフトオフプロセス可、ロードロック
成膜	D-12 D-13	TU-159 TU-160 TU-161	自動搬送 芝浦スパッタ装置 自動搬送 芝浦スパッタ装置(冷却型)	芝浦メカトロニクス!-Miller CFS- 4EP-LL	6,996 8,646	9,328 11,528	11,198 13,838	7,238 8,998	9,042	最大8インチ	基板ステージφ220mm、3インチターゲット×4、基板加熱形(最高300℃)、ロードロック付、 自動搬送付 基板ステージφ220mm、3インチターゲット×4、基板冷却型、リフトオフプロセス可、ロードロック 付、自動搬送付
成膜	D-12 D-13	TU-159 TU-160 TU-161	自動搬送 芝浦スパッタ装置 自動搬送 芝浦スパッタ装置(冷却	芝浦メカトロニクス!-Miller CFS- 4EP-LL 芝浦メカトロニクス!-Miller CFS- 4EP-LL	6,996	9,328	11,198	7,238	9,042	最大8インチ	基板ステージφ220mm、3インチターゲット×4、基板加熱形(最高300℃)、ロードロック付、自動搬送付 基板ステージφ220mm、3インチターゲット×4、基板冷却型、リフトオフプロセス可、ロードロック付、自動搬送付 小片~6インチ、ターゲット数 2、ターゲット・ステージ間距離 150mm、コリメータ付、エッチング可
成膜	D-12 D-13 D-14	TU-159 TU-160 TU-161 TU-162	自動搬送 芝浦スパッタ装置 自動搬送 芝浦スパッタ装置(冷却型)	芝浦メカトロニクス!-Miller CFS- 4EP-LL 芝浦メカトロニクス!-Miller CFS- 4EP-LL エリオニクス EIS-200ERP-NPD-	6,996 8,646	9,328 11,528	11,198 13,838	7,238 8,998	9,042 11,242 7,986	最大8インチ	基板ステージφ220mm、3インチターゲット×4、基板加熱形(最高300℃)、ロードロック付、 自動搬送付 基板ステージφ220mm、3インチターゲット×4、基板冷却型、リフトオフプロセス可、ロードロック 付、自動搬送付
成膜	D-12 D-13 D-14	TU-159 TU-160 TU-161 TU-162 TU-163	自動搬送 芝浦スパッタ装置 自動搬送 芝浦スパッタ装置(冷却型) ECRロングスロースパッタ	芝浦メカトロニクス!-Miller CFS- 4EP-LL 芝浦メカトロニクス!-Miller CFS- 4EP-LL エリオニクス EIS-200ERP-NPD- TK アネルバ SPC-350	6,996 8,646 6,424 5,984	9,328 11,528 8,558 7,964	11,198 13,838 10,274 9,570	7,238 8,998 6,402 6,336	9,042 11,242 7,986 7,898	最大8インチ 最大8インチ 最大6インチ	基板ステージφ220mm、3インチターゲット×4、基板加熱形(最高300℃)、ロードロック付、自動搬送付 基板ステージφ220mm、3インチターゲット×4、基板冷却型、リフトオフプロセス可、ロードロック付、自動搬送付 小片~6インチ、ターゲット数 2、ターゲット-ステージ間距離 150mm、コリメータ付、エッチング可1バッチ最大6枚搭載可能(回転機構付)、6インチターゲット×3(DC×2、RF×1:同時放電可能)、基板加熱形(最高650℃)、強磁性体対応、ロードロック付、クライオポンプ金属用(DC)スパッタチャンバ、酸化物用(RF)スパッタチャンバ、酸素加圧アニールチャンバの3つの
成膜	D-12 D-13 D-14 D-15 D-16	TU-159 TU-160 TU-161 TU-162 TU-163 TU-164	自動搬送 芝浦スパッタ装置 自動搬送 芝浦スパッタ装置(冷却型) ECRロングスロースパッタ アネルバマルチスパッタ 酸素加圧RTA付高温スパッタ装置	芝浦メカトロニクス!-Miller CFS- 4EP-LL 芝浦メカトロニクス!-Miller CFS- 4EP-LL エリオニクス EIS-200ERP-NPD- TK アネルバ SPC-350 ユーテック 21-0604	6,996 8,646 6,424 5,984 13,508	9,328 11,528 8,558 7,964 17,996	11,198 13,838 10,274 9,570 21,604	7,238 8,998 6,402 6,336	9,042 11,242 7,986 7,898 15,818	最大8インチ 最大8インチ 最大6インチ 4インチ 最大8インチ	基板ステージφ220mm、3インチターゲット×4、基板加熱形(最高300℃)、ロードロック付、自動搬送付 基板ステージφ220mm、3インチターゲット×4、基板冷却型、リフトオフプロセス可、ロードロック付、自動搬送付 小片~6インチ、ターゲット数 2、ターゲット-ステージ間距離 150mm、コリメータ付、エッチング可1バッチ最大6枚搭載可能(回転機構付)、6インチターゲット×3(DC×2、RF×1:同時放電可能)、基板加熱形(最高650℃)、強磁性体対応、ロードロック付、クライオポンプ金属用(DC)スパッタチャンバ、酸化物用(RF)スパッタチャンバ、酸素加圧アニールチャンバの3つのチャンバで構成。最高基板温度は700℃。主にPZT下地成膜、PZT成膜用。
成膜	D-12 D-13 D-14 D-15 D-16 D-17	TU-159 TU-160 TU-161 TU-162 TU-163 TU-164 TU-165	自動搬送 芝浦スパッタ装置 自動搬送 芝浦スパッタ装置(冷却型) ECRロングスロースパッタ アネルバマルチスパッタ 酸素加圧RTA付高温スパッタ装置	芝浦メカトロニクス!-Miller CFS- 4EP-LL 芝浦メカトロニクス!-Miller CFS- 4EP-LL エリオニクス EIS-200ERP-NPD- TK アネルバ SPC-350 ユーテック 21-0604 アネルバ SPF-730	6,996 8,646 6,424 5,984 13,508 8,778	9,328 11,528 8,558 7,964 17,996 11,682	11,198 13,838 10,274 9,570 21,604 14,036	7,238 8,998 6,402 6,336 12,672 8,888	9,042 11,242 7,986 7,898 15,818 11,088	最大8インチ 最大8インチ 最大6インチ 4インチ 最大8インチ	基板ステージφ220mm、3インチターゲット×4、基板加熱形(最高300℃)、□ード□ック付、自動搬送付 基板ステージφ220mm、3インチターゲット×4、基板冷却型、リフトオフプロセス可、ロードロック付、自動搬送付 小片~6インチ、ターゲット数 2、ターゲット-ステージ間距離 150mm、コリメータ付、エッチング可1バッチ最大6枚搭載可能(回転機構付)、6インチターゲット×3(DC×2、RF×1:同時放電可能)、基板加熱形(最高650℃)、強磁性体対応、ロードロック付、クライオポンプ金属用(DC)スパッタチャンバ、酸化物用(RF)スパッタチャンバ、酸素加圧アニールチャンバの3つのチャンバで構成。最高基板温度は700℃。主にPZT下地成膜、PZT成膜用。 1バッチ9枚(4インチ)、8インチターゲット×3
成膜	D-12 D-13 D-14 D-15 D-16 D-17	TU-159 TU-160 TU-161 TU-162 TU-163 TU-164 TU-165	自動搬送 芝浦スパッタ装置 自動搬送 芝浦スパッタ装置(冷却型) ECRロングスロースパッタ アネルバマルチスパッタ 酸素加圧RTA付高温スパッタ装置	芝浦メカトロニクス!-Miller CFS- 4EP-LL 芝浦メカトロニクス!-Miller CFS- 4EP-LL エリオニクス EIS-200ERP-NPD- TK アネルバ SPC-350 ユーテック 21-0604	6,996 8,646 6,424 5,984 13,508	9,328 11,528 8,558 7,964 17,996 11,682	11,198 13,838 10,274 9,570 21,604	7,238 8,998 6,402 6,336	9,042 11,242 7,986 7,898 15,818 11,088	最大8インチ 最大8インチ 最大6インチ 4インチ 最大8インチ	基板ステージφ220mm、3インチターゲット×4、基板加熱形(最高300℃)、□ード□ック付、自動搬送付 基板ステージφ220mm、3インチターゲット×4、基板冷却型、リフトオフプロセス可、ロードロック付、自動搬送付 小片~6インチ、ターゲット数 2、ターゲット-ステージ間距離 150mm、コリメータ付、エッチング可1バッチ最大6枚搭載可能(回転機構付)、6インチターゲット×3(DC×2、RF×1:同時放電可能)、基板加熱形(最高650℃)、強磁性体対応、ロードロック付、クライオポンプ金属用(DC)スパッタチャンバ、酸化物用(RF)スパッタチャンバ、酸素加圧アニールチャンバの3つのチャンバで構成。最高基板温度は700℃。主にPZT下地成膜、PZT成膜用。 1バッチ9枚(4インチ)、8インチターゲット×3
成膜	D-12 D-13 D-14 D-15 D-16 D-17 D-18 D-19	TU-159 TU-160 TU-161 TU-162 TU-163 TU-164 TU-165 TU-166 TU-167	自動搬送 芝浦スパッタ装置 自動搬送 芝浦スパッタ装置(冷却型) ECRロングスロースパッタ アネルバマルチスパッタ 酸素加圧RTA付高温スパッタ装置 アネルバスパッタ装置 球面成膜用スパッタ装置 電子ビーム蒸着装置	芝浦メカトロニクス!-Miller CFS- 4EP-LL 芝浦メカトロニクス!-Miller CFS- 4EP-LL エリオニクス EIS-200ERP-NPD- TK アネルバ SPC-350 ユーテック 21-0604 アネルバ SPF-730 和泉テック -	6,996 8,646 6,424 5,984 13,508 8,778 5,214 7,722	9,328 11,528 8,558 7,964 17,996 11,682 6,930 10,274	11,198 13,838 10,274 9,570 21,604 14,036 8,316 12,342	7,238 8,998 6,402 6,336 12,672 8,888	9,042 11,242 7,986 7,898 15,818 11,088 6,886	最大8インチ 最大8インチ 最大6インチ 4インチ 最大8インチ	基板ステージφ220mm、3インチターゲット×4、基板加熱形(最高300℃)、ロードロック付、自動搬送付 基板ステージφ220mm、3インチターゲット×4、基板冷却型、リフトオフプロセス可、ロードロック付、自動搬送付 小片~6インチ、ターゲット数 2、ターゲット-ステージ間距離 150mm、コリメータ付、エッチング可1バッチ最大6枚搭載可能(回転機構付)、6インチターゲット×3(DC×2、RF×1:同時放電可能)、基板加熱形(最高650℃)、強磁性体対応、ロードロック付、クライオポンプ金属用(DC)スパッタチャンバ、酸化物用(RF)スパッタチャンバ、酸素加圧アニールチャンバの3つのチャンバで構成。最高基板温度は700℃。主にPZT下地成膜、PZT成膜用。 1バッチ9枚(4インチ)、8インチターゲット×3 球面体(直径1.0、3.3mm)へのスパッタリング、膜種:Au、Cr、Al、Pd、SiO2他、O2プラズ
成膜	D-12 D-13 D-14 D-15 D-16 D-17 D-18 D-19 D-20	TU-159 TU-160 TU-161 TU-162 TU-163 TU-164 TU-165 TU-166 TU-167 TU-168	自動搬送 芝浦スパッタ装置 自動搬送 芝浦スパッタ装置(冷却型) ECRロングスロースパッタ アネルバマルチスパッタ 酸素加圧RTA付高温スパッタ装置 アネルバスパッタ装置 球面成膜用スパッタ装置 電子ビーム蒸着装置 めっき装置	芝浦メカトロニクス!-Miller CFS-4EP-LL 芝浦メカトロニクス!-Miller CFS-4EP-LL エリオニクス EIS-200ERP-NPD-TK アネルバ SPC-350 ユーテック 21-0604 アネルバ SPF-730 和泉テック -	6,996 8,646 6,424 5,984 13,508 8,778 5,214	9,328 11,528 8,558 7,964 17,996 11,682 6,930 10,274	11,198 13,838 10,274 9,570 21,604 14,036 8,316	7,238 8,998 6,402 6,336 12,672 8,888 5,522	9,042 11,242 7,986 7,898 15,818 11,088 6,886 9,658	最大8インチ 最大8インチ 最大6インチ 4インチ 最大8インチ 最大6インチ 球面体	基板ステージφ220mm、3インチターゲット×4、基板加熱形(最高300℃)、ロードロック付、自動搬送付 基板ステージφ220mm、3インチターゲット×4、基板冷却型、リフトオフプロセス可、ロードロック付、自動搬送付 小片~6インチ、ターゲット数 2、ターゲット-ステージ間距離 150mm、コリメータ付、エッチング可1/バッチ最大6枚搭載可能(回転機構付)、6インチターゲット×3(DC×2、RF×1:同時放電可能)、基板加熱形(最高650℃)、強磁性体対応、ロードロック付、クライオポンプ金属用(DC)スパッタチャンバ、酸化物用(RF)スパッタチャンバ、酸素加圧アニールチャンバの3つのチャンバで構成。最高基板温度は700℃。主にPZT下地成膜、PZT成膜用。 1バッチ9枚(4インチ)、8インチターゲット×3 球面体(直径1.0、3.3mm)へのスパッタリング、膜種:Au、Cr、Al、Pd、SiO2他、O2プラズマクリーニング可
成膜	D-12 D-13 D-14 D-15 D-16 D-17 D-18 D-19 D-20	TU-159 TU-160 TU-161 TU-162 TU-163 TU-164 TU-165 TU-166 TU-167 TU-168	自動搬送 芝浦スパッタ装置 自動搬送 芝浦スパッタ装置(冷却型) ECRロングスロースパッタ アネルバマルチスパッタ 酸素加圧RTA付高温スパッタ装置 アネルバスパッタ装置 球面成膜用スパッタ装置 電子ビーム蒸着装置	芝浦メカトロニクス!-Miller CFS- 4EP-LL 芝浦メカトロニクス!-Miller CFS- 4EP-LL エリオニクス EIS-200ERP-NPD- TK アネルバ SPC-350 ユーテック 21-0604 アネルバ SPF-730 和泉テック -	6,996 8,646 6,424 5,984 13,508 8,778 5,214 7,722	9,328 11,528 8,558 7,964 17,996 11,682 6,930 10,274 3,740	11,198 13,838 10,274 9,570 21,604 14,036 8,316 12,342 4,488	7,238 8,998 6,402 6,336 12,672 8,888 5,522 7,744	9,042 11,242 7,986 7,898 15,818 11,088 6,886 9,658 3,476	最大8インチ 最大8インチ 最大6インチ 4インチ 最大8インチ 最大6インチ 球面体 最大6インチ 最大6インチ	基板ステージφ220mm、3インチターゲット×4、基板加熱形(最高300℃)、ロードロック付、自動搬送付 基板ステージφ220mm、3インチターゲット×4、基板冷却型、リフトオフプロセス可、ロードロック付、自動搬送付  小片~6インチ、ターゲット数 2、ターゲット-ステージ間距離 150mm、コリメータ付、エッチング可1/バッチ最大6枚搭載可能(回転機構付)、6インチターゲット×3(DC×2、RF×1:同時放電可能)、基板加熱形(最高650℃)、強磁性体対応、ロードロック付、クライオポンプ金属用(DC)スパッタチャンバ、酸化物用(RF)スパッタチャンバ、酸素加圧アニールチャンバの3つのチャンバで構成。最高基板温度は700℃。主にPZT下地成膜、PZT成膜用。  1/バッチ9枚(4インチ)、8インチターゲット×3  球面体(直径1.0、3.3mm)へのスパッタリング、膜種:Au、Cr、Al、Pd、SiO2他、O2プラズマクリーニング可 主に金属薄膜の蒸着
成膜	D-12 D-13 D-14 D-15 D-16 D-17 D-18 D-19 D-20 D-21	TU-159 TU-160 TU-161 TU-162 TU-163 TU-164 TU-165 TU-166 TU-167 TU-168 TU-169	自動搬送 芝浦スパッタ装置 自動搬送 芝浦スパッタ装置(冷却型) ECRロングスロースパッタ アネルバマルチスパッタ 酸素加圧RTA付高温スパッタ装置 アネルバスパッタ装置 球面成膜用スパッタ装置 電子ビーム蒸着装置 めっき装置 多元材料原子層堆積(ALD)装	芝浦メカトロニクス!-Miller CFS-4EP-LL 芝浦メカトロニクス!-Miller CFS-4EP-LL エリオニクス EIS-200ERP-NPD-TK アネルバ SPC-350 ユーテック 21-0604 アネルバ SPF-730 和泉テック - アネルバ EVC-1501 山本鍍金試験器 特注	6,996 8,646 6,424 5,984 13,508 8,778 5,214 7,722 2,816	9,328 11,528 8,558 7,964 17,996 11,682 6,930 10,274 3,740 13,772	11,198 13,838 10,274 9,570 21,604 14,036 8,316 12,342 4,488 16,544	7,238 8,998 6,402 6,336 12,672 8,888 5,522 7,744 2,794 10,912	9,042 11,242 7,986 7,898 15,818 11,088 6,886 9,658 3,476 13,640	最大8インチ 最大8インチ 最大6インチ 4インチ 最大8インチ 最大6インチ 球面体 最大6インチ 最大6インチ	基板ステージφ220mm、3インチターゲット×4、基板加熱形(最高300℃)、□ード□ック付、自動搬送付 基板ステージφ220mm、3インチターゲット×4、基板冷却型、リフトオフプロセス可、□ード□ック付、自動搬送付 小片~6インチ、ターゲット数 2、ターゲット-ステージ間距離 150mm、コリメータ付、エッチング可1/バッチ最大6枚搭載可能(回転機構付)、6インチターゲット×3(DC×2、RF×1:同時放電可能)、基板加熱形(最高650℃)、強磁性体対応、□ードロック付、クライオポンプ金属用(DC)スパッタチャンバ、酸化物用(RF)スパッタチャンバ、酸素加圧アニールチャンバの3つのチャンバで構成。最高基板温度は700℃。主にPZT下地成膜、PZT成膜用。 1/バッチ9枚(4インチ)、8インチターゲット×3 球面体(直径1.0、3.3mm)へのスパッタリング、膜種:Au、Cr、Al、Pd、SiO2他、O2プラズマクリーニング可主に金属薄膜の蒸着 Cu、Ni、Sn、Au
成膜	D-12 D-13 D-14 D-15 D-16 D-17 D-18 D-19 D-20 D-21 D-22	TU-159 TU-160 TU-161 TU-162 TU-163 TU-164 TU-165 TU-166 TU-167 TU-168 TU-169 TU-170	自動搬送 芝浦スパッタ装置 自動搬送 芝浦スパッタ装置(冷却型) ECRロングスロースパッタ アネルバマルチスパッタ 酸素加圧RTA付高温スパッタ装置 アネルバスパッタ装置 球面成膜用スパッタ装置 電子ビーム蒸着装置 めっき装置 多元材料原子層堆積(ALD)装置	芝浦メカトロニクス!-Miller CFS-4EP-LL 芝浦メカトロニクス!-Miller CFS-4EP-LL エリオニクス EIS-200ERP-NPD-TK アネルバ SPC-350 ユーテック 21-0604 アネルバ SPF-730 和泉テック - アネルバ EVC-1501 山本鍍金試験器 特注 テクノファイン ALK-600	6,996 8,646 6,424 5,984 13,508 8,778 5,214 7,722 2,816 10,340	9,328 11,528 8,558 7,964 17,996 11,682 6,930 10,274 3,740 13,772 11,704	11,198 13,838 10,274 9,570 21,604 14,036 8,316 12,342 4,488 16,544 14,058	7,238 8,998 6,402 6,336 12,672 8,888 5,522 7,744 2,794 10,912	9,042 11,242 7,986 7,898 15,818 11,088 6,886 9,658 3,476 13,640 11,264	最大8インチ 最大8インチ 最大6インチ 4インチ 最大8インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ	基板ステージφ220mm、3インチターゲット×4、基板加熱形(最高300℃)、ロードロック付、自動搬送付 基板ステージφ220mm、3インチターゲット×4、基板冷却型、リフトオフプロセス可、ロードロック付、自動搬送付 小片~6インチ、ターゲット数 2、ターゲット-ステージ間距離 150mm、コリメータ付、エッチング可 1バッチ最大6枚搭載可能(回転機構付)、6インチターゲット×3(DC×2、RF×1:同時放電可能)、基板加熱形(最高650℃)、強磁性体対応、ロードロック付、クライオポンプ金属用(DC)スパッタチャンバ、酸化物用(RF)スパッタチャンバ、酸素加圧アニールチャンバの3つのチャンバで構成。最高基板温度は700℃。主にPZT下地成膜、PZT成膜用。 1バッチ9枚(4インチ)、8インチターゲット×3 球面体(直径1.0、3.3mm)へのスパッタリング、膜種:Au、Cr、Al、Pd、SiO2他、O2プラズマクリーニング可主に金属薄膜の蒸着 Cu、Ni、Sn、Au

		<u></u>	D. Dreit III // A	任友精密上業 MUC-21 ASE-	0.070	10.474	4 4 000				
		-	DeepRIE装置#1	SRE 任友精密工業 MUC-21 ASE-	9,372	12,474	14,982	9,592 9,592	<u> </u>		Siの深堀エッチング、メカニカルチャック Siの深堀エッチング、メカニカルチャック
	E-02 E-03		DeepRIE装置#2 DeepRIE装置#3	SRF STS Multiplex-ICP SR	9,372 9,988	12,474 13,310	14,982 15,972	10,208	· ·		Siの深堀エッチング、メカニカルチャック
	E-03 E-04		DeepRIE装置#4	任友精密工業 MUC-21 ASE-		21,824	26,202	16,786			Siの深堀エッチング、移電チャック
			·	HR	16,368	-	,		-		SiO2、メタルなどの多目的ドライエッチング、静電チャック、ガス:CF4、CHF3、SF6、Ar、O2、
	E-05	TU-205	アルバックICP-RIE#1	アルバック NE-550	19,206	25,586	30,712	18,304	21,998		N2、Cl2、BCl3
	E-06	TU-206	アルバックICP-RIE#2	アルバック CE-300I	18,150	24,200	29,040	17,512	21,138	最大bインナ	SiO2,メタルなどの多目的ドライエッチング、静電チャック、ガス:CF4、CHF3、SF6、Ar、O2、N2、Cl2、BCl3
	E-07	TH-207	アルバック多用途RIE装置	アルバック RIH-1515Z	11,748	15,664	18,810	11,440	14 028	 最大6インチ	金属膜や圧電膜も対象とした多目的のドライエッチング、ガス:Cl2、BCl3、SF6、CF4、CHF3、
_					•	•	,	·			Ar, N2, O2
エッ		-	アネルバRIE装置	アネルバ DEA-506	9,086	12,100		8,844			SiN、SiO2のドライエッチング、ガス:CF4、CHF3
チ			アネルバSi RIE装置	アネルバ L-507DL	7,172	9,548	-	7,304	·		Siのドライエッチング、ガス:SF6
ググ			Al-RIE装置	芝浦メカトロニクス HIRRIE-100	12,672	16,874	20,262	12,870	16,100	最大6インチ	AlやSiのドライエッチング、カセットtoカセット、ガス:Cl2、BCl3
	E-11	TU-211	プラズマクリーナー	ヤマト科学 PDC210	3,828	5,104	6,138	3,982	4,860	最大6インチ	O2またはArによるウェハ表面のプラズマクリーニング、レジストアッシング
	E-12	TU-212	アルバック アッシング装置	アルバック UNA-2000	4,950	6,578	7,898	5,038	6,162	最大6インチ	2.45GH z 、カセットtoカセット
	E-13	TU-213	ブランソン アッシング装置	ブランソン IPC4000	4,576	6,094	7,326	4,576	5,608	最大6インチ	13.56MH z
	E-14	TU-214	ケミカルドライエッチャー(CDE)	芝浦メカトロニクス CDE7	7,282	9,702	11,660	7,304	9,016	最大4インチ	ラジカルによる低ダメージのSi、SiN等方性ドライエッチング、DRIE後のスキャロップ除去、ガス: CF4、O2、N2
	E-15	TU-215		エヌ・エス/伯東 20IBE-C	11,022	14,674	17,622	11,484	14,160		Arイオン、4インチ×6枚、6インチ×3枚
			Vapor HFエッチング装置	住友精密工業 Primaxx uEtch	9,548	12,716		9,614	11,752	最大8インチ	  気相フッ酸による主にSiO2犠牲層エッチング
			KOHエッチング槽		3,300	4,378		3,322	4,140	最大6インチ	Si結晶異方性エッチング
	E-18	TU-218	TMAHエッチング槽		4,026	5,368		3,938	4,804	最大6インチ	Si結晶異方性エッチング
	F-01	TU-251	SUSS ウェハ接合装置	SUSS SB6e	7,502	9,988	11,990	7,546	8,074	最大6インチ	陽極接合、金属接合、ポリマー接合
	F-02	TU-252	EVG ウェハ接合用アライナ	EVG Smart View Aligner	5,918	7,876	9,460	5,852	7,244	最大8インチ	IR透過アライメント可能
	F-03	TU-253	EVG ウェハ接合装置	EVG 520	6,358	8,470	10,164	6,402	7,848	最大8インチ	熱圧着接合用
	F-04	TU-254	EVG プラズマ活性化装置	EVG 810	8,382	11,176	13,420	8,602	10,454	最大6インチ	直接接合前のプラズマ活性化処理 標準ガス:N2
	F-05	TU-255	ディスコ ダイサ	ディスコ DAD-522	3,432	4,576	5,500	3,586	4,136	最大6インチ	切削水:水道水
接	F-06	TU-256	東京精密 ダイサ	東京精密 0	10,164	13,530	16,236	10,516	12,958	最大6インチ	切削水:純水
合	F-07	TU-257	ワイヤボンダ	Westbond -	1,870	2,486	2,992	1,892	2,304	<u>_</u> チップ	Al. Au
研	F-08	TU-258	レーザマーカ	GSIルモニクス WM-II	3,300	4,400	5,280	3,344	4,106	4インチ	ウェハのマーキング
磨	F-09	TU-259	サンドブラスト	新東 -	5,060	6,732	8,096	4,994	4,790	最大6インチ	ガラスの穴あけ加工
パ	F-10	TU-260	4インチウェハ研磨装置	BNテクノロジー Bni52	2,046	2,706	3,256	1,980	2,658	最大4インチ	Si、SiO2、金属などの研磨、CMP
ツ			6インチウェハ研磨装置	BNテクノロジー Bni62	2,310	3,058	3,674	2,266	3,040	最大6インチ	Si、SiO2、金属などの研磨、CMP
ケー			サーフェイスプレナー	ディスコ DAS8920	18,810	25,080	30,096	18,832	19,850	4、8インチ	Au、Cuバンプの平坦化
ン		-	UVインプリント装置	東芝機械 ST-50	6,622	8,822	10,604	6,974			UV光を用いたインプリント装置、ステップ&リピート可能
ΔŤ		-	熱インプリント装置	オリジン電気 Reprina-T50A	6,204	8,272	9,944	6,556			最大650℃、最大30kN
-			エキシマ洗浄装置	デアネヒステ EXC-1201-DN	3,498	4,664	-	3,388	-		ウェハや石英モールド上の有機物の除去
			セミオートワイヤボンダ	TPT HB16 セミオート	1,804	2,398	+	1,826			ボールボンド、ウェッジボンドの両方が可能、セミオート対応
			サブフェムト・インクジェット	SIJテクノロジ PR150-THU シーフォース 028J plus Build size: 90x90x90mm Layer	4,422	5,874	7,062	4,576	5,596		最小線幅:約5um
	F-18	ITU-268	光造形3Dプリンター			2 2 4 6	4 700				
				thickness (min): 0.01mm XY accuracy: 0.022mm	2,948	3,916	4,708	2,926			最小積層ピッチ: 0.01mm、最大造形サイズ: 90mm x 90mm x 90mm
	F-19	TU-269	マイクロマニピュレータ	マイクロサポート	1,936	2,574	3,102	1,870	2,264	EL42.0.7	マイクロスコープ一体型マイクロマニピュレーターシステム
	F-19 F-20	TU-269 TU-270	マイクロマニピュレータ ウォーターレーザ	マイクロサポート 澁谷工業 LAMICS AQL-1900	1,936 6,732	2,574 8,954	3,102 10,758	1,870 6,908	2,264 7,860		マイクロスコープ一体型マイクロマニピュレーターシステム シリコンウェハや金属薄板の加工(ガラスなどの透明材料はNG)、最小加工線幅:約70µm
	F-19 F-20 G-01	TU-269 TU-270 TU-301	マイクロマニピュレータ ウォーターレーザ ウェハゴミ検査装置	マイクロサポート 澁谷工業 LAMICS AQL-1900 トプコン WM-3	1,936 6,732 2,728	2,574 8,954 3,630	3,102 10,758 4,356	1,870 6,908 2,816	2,264 7,860 3,366	最大6インチ	マイクロスコープ一体型マイクロマニピュレーターシステムシリコンウェハや金属薄板の加工(ガラスなどの透明材料はNG)、最小加工線幅:約70μmウェハ上のパーティクル測定(数、大きさ)
	F-19 F-20 G-01 G-02	TU-269 TU-270 TU-301 TU-302	マイクロマニピュレータ ウォーターレーザ ウェハゴミ検査装置 膜厚計	マイクロサポート 澁谷工業 LAMICS AQL-1900 トプコン WM-3 ナノメトリクス NanoSpec3000	1,936 6,732 2,728 2,112	2,574 8,954 3,630 2,794	3,102 10,758 4,356 3,366	1,870 6,908 2,816 2,156	2,264 7,860 3,366 2,600	最大6インチ	マイクロスコープ一体型マイクロマニピュレーターシステム シリコンウェハや金属薄板の加工(ガラスなどの透明材料はNG)、最小加工線幅:約70μm ウェハ上のパーティクル測定(数、大きさ) 光学式の膜厚測定
	F-19 F-20 G-01 G-02 G-03	TU-269 TU-270 TU-301 TU-302 TU-303	マイクロマニピュレータ ウォーターレーザ ウェハゴミ検査装置 膜厚計 卓上型エリプソ	マイクロサポート 澁谷工業 LAMICS AQL-1900 トプコン WM-3 ナノメトリクス NanoSpec3000 フォトニックラティス SE-101	1,936 6,732 2,728 2,112 1,320	2,574 8,954 3,630 2,794 1,760	3,102 10,758 4,356 3,366 2,112	1,870 6,908 2,816 2,156 1,408	2,264 7,860 3,366 2,600 1,820	最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ	マイクロスコープー体型マイクロマニピュレーターシステム シリコンウェハや金属薄板の加工(ガラスなどの透明材料はNG)、最小加工線幅:約70μm ウェハ上のパーティクル測定(数、大きさ) 光学式の膜厚測定 高速サンプリング可能なエリプソ
	F-19 F-20 G-01 G-02 G-03 G-04	TU-269 TU-270 TU-301 TU-302 TU-303 TU-304	マイクロマニピュレータ ウォーターレーザ ウェハゴミ検査装置 膜厚計 卓上型エリプソ エリプソ	マイクロサポート 澁谷工業 LAMICS AQL-1900 トプコン WM-3 ナノメトリクス NanoSpec3000 フォトニックラティス SE-101 アルバック -	1,936 6,732 2,728 2,112 1,320 1,606	2,574 8,954 3,630 2,794 1,760 2,134	3,102 10,758 4,356 3,366 2,112 2,574	1,870 6,908 2,816 2,156 1,408 1,672	2,264 7,860 3,366 2,600 1,820 2,074	最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ	マイクロスコープー体型マイクロマニピュレーターシステム シリコンウェハや金属薄板の加工(ガラスなどの透明材料はNG)、最小加工線幅:約70μm ウェハ上のパーティクル測定(数、大きさ) 光学式の膜厚測定 高速サンプリング可能なエリプソ 薄膜の厚さ、屈折率測定
	F-19 F-20 G-01 G-02 G-03 G-04 G-05	TU-269 TU-270 TU-301 TU-302 TU-303 TU-304 TU-305	マイクロマニピュレータ ウォーターレーザ ウェハゴミ検査装置 膜厚計 卓上型エリプソ エリプソ Dektak 段差計	マイクロサポート 澁谷工業 LAMICS AQL-1900 トプコン WM-3 ナノメトリクス NanoSpec3000 フォトニックラティス SE-101 アルバック - Dektak 8	1,936 6,732 2,728 2,112 1,320 1,606 2,376	2,574 8,954 3,630 2,794 1,760 2,134 3,146	3,102 10,758 4,356 3,366 2,112 2,574 3,784	1,870 6,908 2,816 2,156 1,408	2,264 7,860 3,366 2,600 1,820 2,074 2,912	最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ	マイクロスコープ一体型マイクロマニピュレーターシステム シリコンウェハや金属薄板の加工(ガラスなどの透明材料はNG)、最小加工線幅:約70μm ウェハ上のパーティクル測定(数、大きさ) 光学式の膜厚測定 高速サンプリング可能なエリプソ 薄膜の厚さ、屈折率測定 触針式の表面形状測定
	F-19 F-20 G-01 G-02 G-03 G-04 G-05 G-06	TU-269 TU-270 TU-301 TU-302 TU-303 TU-304 TU-305 TU-306	マイクロマニピュレータ ウォーターレーザ ウェハゴミ検査装置 膜厚計 卓上型エリプソ エリプソ Dektak 段差計 Tencor 段差計	マイクロサポート 澁谷工業 LAMICS AQL-1900 トプコン WM-3 ナノメトリクス NanoSpec3000 フォトニックラティス SE-101 アルバック -	1,936 6,732 2,728 2,112 1,320 1,606 2,376 2,332	2,574 8,954 3,630 2,794 1,760 2,134 3,146 3,102	3,102 10,758 4,356 3,366 2,112 2,574 3,784 3,740	1,870 6,908 2,816 2,156 1,408 1,672 2,420	2,264 7,860 3,366 2,600 1,820 2,074 2,912 2,912	最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ	マイクロスコープー体型マイクロマニピュレーターシステム シリコンウェハや金属薄板の加工(ガラスなどの透明材料はNG)、最小加工線幅:約70μm ウェハ上のパーティクル測定(数、大きさ) 光学式の膜厚測定 高速サンプリング可能なエリプソ 薄膜の厚さ、屈折率測定
	F-19 F-20 G-01 G-02 G-03 G-04 G-05 G-06 G-07	TU-269 TU-270 TU-301 TU-302 TU-303 TU-304 TU-305 TU-306 TU-307	マイクロマニピュレータ ウォーターレーザ ウェハゴミ検査装置 膜厚計 卓上型エリプソ エリプソ Dektak 段差計 Tencor 段差計 金属顕微鏡	マイクロサポート 澁谷工業 LAMICS AQL-1900 トプコン WM-3 ナノメトリクス NanoSpec3000 フォトニックラティス SE-101 アルバック - Dektak 8 Tencor AlphaStep ニコン L150、L200	1,936 6,732 2,728 2,112 1,320 1,606 2,376 2,332 2,002	2,574 8,954 3,630 2,794 1,760 2,134 3,146 3,102 2,662	3,102 10,758 4,356 3,366 2,112 2,574 3,784 3,740 3,212	1,870 6,908 2,816 2,156 1,408 1,672 2,420 2,420 2,046	2,264 7,860 3,366 2,600 1,820 2,074 2,912 2,912 2,296	最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ	マイクロスコープー体型マイクロマニピュレーターシステム シリコンウェハや金属薄板の加工(ガラスなどの透明材料はNG)、最小加工線幅:約70μm ウェハ上のパーティクル測定(数、大きさ) 光学式の膜厚測定 高速サンプリング可能なエリプソ 薄膜の厚さ、屈折率測定 触針式の表面形状測定 触針式の表面形状測定 パターン観察
	F-19 F-20 G-01 G-02 G-03 G-04 G-05 G-06 G-07	TU-269 TU-270 TU-301 TU-302 TU-303 TU-304 TU-305 TU-306 TU-307 TU-308	マイクロマニピュレータ ウォーターレーザ ウェハゴミ検査装置 膜厚計 卓上型エリプソ エリプソ Dektak 段差計 Tencor 段差計 金属顕微鏡 デジタル顕微鏡	マイクロサポート 澁谷工業 LAMICS AQL-1900 トプコン WM-3 ナノメトリクス NanoSpec3000 フォトニックラティス SE-101 アルバック - Dektak 8 Tencor AlphaStep ニコン L150、L200 キーエンス/クノーテクノクラフト -	1,936 6,732 2,728 2,112 1,320 1,606 2,376 2,332 2,002 2,288	2,574 8,954 3,630 2,794 1,760 2,134 3,146 3,102 2,662 3,036	3,102 10,758 4,356 3,366 2,112 2,574 3,784 3,740 3,212 3,652	1,870 6,908 2,816 2,156 1,408 1,672 2,420 2,420 2,046 2,288	2,264 7,860 3,366 2,600 1,820 2,074 2,912 2,912 2,296 2,802	最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ	マイクロスコープー体型マイクロマニピュレーターシステム シリコンウェハや金属薄板の加工(ガラスなどの透明材料はNG)、最小加工線幅:約70μm ウェハ上のパーティクル測定(数、大きさ) 光学式の膜厚測定 高速サンプリング可能なエリプソ 薄膜の厚さ、屈折率測定 触針式の表面形状測定 触針式の表面形状測定 パターン観察 パターン観察 パターン観察、デジタル画像保存、電動ステージ(PC制御可)、20~200倍、500~5000倍
	F-19 F-20 G-01 G-02 G-03 G-04 G-05 G-06 G-07 G-08 G-09	TU-269 TU-270 TU-301 TU-302 TU-303 TU-304 TU-305 TU-306 TU-307 TU-308 TU-309	マイクロマニピュレータ ウォーターレーザ ウェハゴミ検査装置 膜厚計 卓上型エリプソ エリプソ Dektak 段差計 Tencor 段差計 金属顕微鏡 デジタル顕微鏡 赤外線顕微鏡	マイクロサポート 澁谷工業 LAMICS AQL-1900 トプコン WM-3 ナノメトリクス NanoSpec3000 フォトニックラティス SE-101 アルバック - Dektak 8 Tencor AlphaStep ニコン L150、L200 キーエンス/クノーテクノクラフト - オリンパス/浜松ホトニクス -	1,936 6,732 2,728 2,112 1,320 1,606 2,376 2,332 2,002 2,288 1,914	2,574 8,954 3,630 2,794 1,760 2,134 3,146 3,102 2,662 3,036 2,552	3,102 10,758 4,356 3,366 2,112 2,574 3,784 3,740 3,212 3,652 3,080	1,870 6,908 2,816 2,156 1,408 1,672 2,420 2,420 2,046 2,288 1,936	2,264 7,860 3,366 2,600 1,820 2,074 2,912 2,912 2,296 2,802 2,390	最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ	マイクロスコープ一体型マイクロマニピュレーターシステム シリコンウェハや金属薄板の加工(ガラスなどの透明材料はNG)、最小加工線幅:約70μm ウェハ上のパーティクル測定(数、大きさ) 光学式の膜厚測定 高速サンプリング可能なエリプソ 薄膜の厚さ、屈折率測定 触針式の表面形状測定 触針式の表面形状測定 パターン観察 パターン観察 パターン観察、デジタル画像保存、電動ステージ(PC制御可)、20~200倍、500~5000倍 両面アライメントの確認、ウェハ接合面のボイド評価等
	F-19 F-20 G-01 G-02 G-03 G-04 G-05 G-06 G-07 G-08 G-09	TU-269 TU-270 TU-301 TU-302 TU-303 TU-304 TU-305 TU-306 TU-307 TU-308 TU-309	マイクロマニピュレータ ウォーターレーザ ウェハゴミ検査装置 膜厚計 卓上型エリプソ エリプソ Dektak 段差計 Tencor 段差計 金属顕微鏡 デジタル顕微鏡	マイクロサポート 澁谷工業 LAMICS AQL-1900 トプコン WM-3 ナノメトリクス NanoSpec3000 フォトニックラティス SE-101 アルバック - Dektak 8 Tencor AlphaStep ニコン L150、L200 キーエンス/クノーテクノクラフト -	1,936 6,732 2,728 2,112 1,320 1,606 2,376 2,332 2,002 2,288	2,574 8,954 3,630 2,794 1,760 2,134 3,146 3,102 2,662 3,036	3,102 10,758 4,356 3,366 2,112 2,574 3,784 3,740 3,212 3,652	1,870 6,908 2,816 2,156 1,408 1,672 2,420 2,420 2,046 2,288	2,264 7,860 3,366 2,600 1,820 2,074 2,912 2,912 2,296 2,802 2,390	最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ	マイクロスコープー体型マイクロマニピュレーターシステム シリコンウェハや金属薄板の加工(ガラスなどの透明材料はNG)、最小加工線幅:約70μm ウェハ上のパーティクル測定(数、大きさ) 光学式の膜厚測定 高速サンプリング可能なエリプソ 薄膜の厚さ、屈折率測定 触針式の表面形状測定 触針式の表面形状測定 パターン観察 パターン観察 パターン観察、デジタル画像保存、電動ステージ(PC制御可)、20~200倍、500~5000倍
	F-19 F-20 G-01 G-02 G-03 G-04 G-05 G-06 G-07 G-08 G-09 G-10	TU-269 TU-270 TU-301 TU-302 TU-303 TU-304 TU-305 TU-306 TU-307 TU-308 TU-309 TU-310	マイクロマニピュレータ ウォーターレーザ ウェハゴミ検査装置 膜厚計 卓上型エリプソ エリプソ Dektak 段差計 Tencor 段差計 金属顕微鏡 デジタル顕微鏡 赤外線顕微鏡	マイクロサポート 澁谷工業 LAMICS AQL-1900 トプコン WM-3 ナノメトリクス NanoSpec3000 フォトニックラティス SE-101 アルバック - Dektak 8 Tencor AlphaStep ニコン L150、L200 キーエンス/クノーテクノクラフト - オリンパス/浜松ホトニクス - レーザーテック OPTELICS	1,936 6,732 2,728 2,112 1,320 1,606 2,376 2,332 2,002 2,288 1,914	2,574 8,954 3,630 2,794 1,760 2,134 3,146 3,102 2,662 3,036 2,552	3,102 10,758 4,356 3,366 2,112 2,574 3,784 3,740 3,212 3,652 3,080	1,870 6,908 2,816 2,156 1,408 1,672 2,420 2,420 2,046 2,288 1,936	2,264 7,860 3,366 2,600 1,820 2,074 2,912 2,912 2,296 2,802 2,390 6,996	最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ	マイクロスコープー体型マイクロマニピュレーターシステム シリコンウェハや金属薄板の加工(ガラスなどの透明材料はNG)、最小加工線幅:約70μm ウェハ上のパーティクル測定(数、大きさ) 光学式の膜厚測定 高速サンプリング可能なエリプソ 薄膜の厚さ、屈折率測定 触針式の表面形状測定  触針式の表面形状測定 パターン観察 パターン観察 パターン観察、デジタル画像保存、電動ステージ(PC制御可)、20~200倍、500~5000倍 両面アライメントの確認、ウェハ接合面のボイド評価等 3次元表面形状測定、DeepRIEのエッチ深さ測定、レーザ光/白色の切替可能、共焦点/非
	F-19 F-20 G-01 G-02 G-03 G-04 G-05 G-06 G-07 G-08 G-09 G-10 G-11	TU-269 TU-270 TU-301 TU-302 TU-303 TU-304 TU-305 TU-306 TU-307 TU-308 TU-309 TU-310 TU-311	マイクロマニピュレータ ウォーターレーザ ウェハゴミ検査装置 膜厚計 卓上型エリプソ エリプソ Dektak 段差計 Tencor 段差計 金属顕微鏡 デジタル顕微鏡 赤外線顕微鏡 レーザ/白色共焦点顕微鏡	マイクロサポート	1,936 6,732 2,728 2,112 1,320 1,606 2,376 2,332 2,002 2,288 1,914 5,610	2,574 8,954 3,630 2,794 1,760 2,134 3,146 3,102 2,662 3,036 2,552 7,480	3,102 10,758 4,356 3,366 2,112 2,574 3,784 3,740 3,212 3,652 3,080 8,976	1,870 6,908 2,816 2,156 1,408 1,672 2,420 2,420 2,046 2,288 1,936 5,654	2,264 7,860 3,366 2,600 1,820 2,074 2,912 2,912 2,296 2,802 2,390 6,996 2,054	最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ	マイクロスコープー体型マイクロマニピュレーターシステム シリコンウェハや金属薄板の加工(ガラスなどの透明材料はNG)、最小加工線幅:約70μm ウェハ上のパーティクル測定(数、大きさ) 光学式の膜厚測定 高速サンプリング可能なエリプソ 薄膜の厚さ、屈折率測定 触針式の表面形状測定  ・ 大ターン観察  パターン観察  パターン観察  パターン観察  パターンではいからいます。 プェールでは、アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・ア
	F-19 F-20 G-01 G-02 G-03 G-04 G-05 G-06 G-07 G-08 G-09 G-10 G-11 G-12	TU-269 TU-270 TU-301 TU-302 TU-303 TU-304 TU-305 TU-306 TU-307 TU-308 TU-309 TU-310 TU-311 TU-312	マイクロマニピュレータ ウォーターレーザ ウェハゴミ検査装置 膜厚計 卓上型エリプソ エリプソ Dektak 段差計 Tencor 段差計 金属顕微鏡 デジタル顕微鏡 赤外線顕微鏡  ホ外線顕微鏡 レーザ/白色共焦点顕微鏡 深さ測定装置	マイクロサポート 澁谷工業 LAMICS AQL-1900 トプコン WM-3 ナノメトリクス NanoSpec3000 フォトニックラティス SE-101 アルバック - Dektak 8 Tencor AlphaStep ニコン L150、L200 キーエンス/クノーテクノクラフト - オリンパス/浜松ホトニクス - レーザーテック OPTELICS HYBRID LS-SD ユニオン光学 Hisomet インサイト IS-350 コムスキャンテクノ ScanXmate	1,936 6,732 2,728 2,112 1,320 1,606 2,376 2,332 2,002 2,288 1,914 5,610 1,606	2,574 8,954 3,630 2,794 1,760 2,134 3,146 3,102 2,662 3,036 2,552 7,480 2,134	3,102 10,758 4,356 3,366 2,112 2,574 3,784 3,740 3,212 3,652 3,080 8,976 2,574	1,870 6,908 2,816 2,156 1,408 1,672 2,420 2,420 2,420 2,046 2,288 1,936 5,654 1,606	2,264 7,860 3,366 2,600 1,820 2,074 2,912 2,912 2,296 2,802 2,390 6,996 2,054 3,092	最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ	マイクロスコープー体型マイクロマニピュレーターシステム シリコンウェハや金属薄板の加工(ガラスなどの透明材料はNG)、最小加工線幅:約70μm ウェハ上のパーティクル測定(数、大きさ) 光学式の膜厚測定 高速サンプリング可能なエリプソ 薄膜の厚さ、屈折率測定 触針式の表面形状測定  触針式の表面形状測定 パターン観察 パターン観察 パターン観察、デジタル画像保存、電動ステージ(PC制御可)、20~200倍、500~5000倍 両面アライメントの確認、ウェハ接合面のボイド評価等 3次元表面形状測定、DeepRIEのエッチ深さ測定、レーザ光/白色の切替可能、共焦点/非共焦点の切替可能
	F-19 F-20 G-01 G-02 G-03 G-04 G-05 G-06 G-07 G-08 G-10 G-11 G-12 G-13	TU-269 TU-270 TU-301 TU-302 TU-303 TU-304 TU-305 TU-306 TU-307 TU-308 TU-309 TU-310 TU-311 TU-312 TU-313	マイクロマニピュレータ ウォーターレーザ ウェハゴミ検査装置 膜厚計 卓上型エリプソ エリプソ Dektak 段差計 Tencor 段差計 金属顕微鏡 デジタル顕微鏡 赤外線顕微鏡 レーザ/白色共焦点顕微鏡 深さ測定装置 超音波顕微鏡	マイクロサポート	1,936 6,732 2,728 2,112 1,320 1,606 2,376 2,332 2,002 2,288 1,914 5,610 1,606 2,464	2,574 8,954 3,630 2,794 1,760 2,134 3,146 3,102 2,662 3,036 2,552 7,480 2,134 3,278	3,102 10,758 4,356 3,366 2,112 2,574 3,784 3,740 3,212 3,652 3,080 8,976 2,574 3,938 6,402	1,870 6,908 2,816 2,156 1,408 1,672 2,420 2,420 2,046 2,288 1,936 5,654 1,606 2,442	2,264 7,860 3,366 2,600 1,820 2,074 2,912 2,912 2,296 2,802 2,390 6,996 2,054 3,092 5,130	最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ	マイクロスコープー体型マイクロマニピュレーターシステム シリコンウェハや金属薄板の加工(ガラスなどの透明材料はNG)、最小加工線幅:約70μm ウェハ上のパーティクル測定(数、大きさ) 光学式の膜厚測定 高速サンプリング可能なエリプソ 薄膜の厚さ、屈折率測定 触針式の表面形状測定  対ターン観察 パターン観察 パターン観察 パターン観察、デジタル画像保存、電動ステージ(PC制御可)、20~200倍、500~5000倍 両面アライメントの確認、ウェハ接合面のボイド評価等 3次元表面形状測定、DeepRIEのエッチ深さ測定、レーザ光/白色の切替可能、共焦点/非共焦点の切替可能 光学式の非接触深さ測定装置 デバイス内部の非破壊検査、ウェハ接合面の欠陥、ボイド評価等
	F-19 F-20 G-01 G-02 G-03 G-04 G-05 G-06 G-07 G-08 G-10 G-11 G-12 G-13 G-14	TU-269 TU-270 TU-301 TU-302 TU-303 TU-304 TU-305 TU-306 TU-307 TU-308 TU-309 TU-310 TU-311 TU-312 TU-313 TU-314	マイクロマニピュレータ ウォーターレーザ ウェハゴミ検査装置 膜厚計 卓上型エリプソ エリプソ Dektak 段差計 Tencor 段差計 金属顕微鏡 デジタル顕微鏡 赤外線顕微鏡 レーザ/白色共焦点顕微鏡 深さ測定装置 超音波顕微鏡 マイクロX線CT	マイクロサポート  澁谷工業 LAMICS AQL-1900 トプコン WM-3 ナノメトリクス NanoSpec3000 フォトニックラティス SE-101 アルバック - Dektak 8 Tencor AlphaStep ニコン L150、L200 キーエンス/クノーテクノクラフト - オリンパス/浜松ホトニクス - レーザーテック OPTELICS HYBRID LS-SD ユニオン光学 Hisomet インサイト IS-350 コムスキャンテクノ ScanXmate D160TS110	1,936 6,732 2,728 2,112 1,320 1,606 2,376 2,332 2,002 2,288 1,914 5,610 1,606 2,464 4,004	2,574 8,954 3,630 2,794 1,760 2,134 3,146 3,102 2,662 3,036 2,552 7,480 2,134 3,278 5,324	3,102 10,758 4,356 3,366 2,112 2,574 3,784 3,740 3,212 3,652 3,080 8,976 2,574 3,938 6,402	1,870 6,908 2,816 2,156 1,408 1,672 2,420 2,420 2,420 2,046 2,288 1,936 5,654 1,606 2,442 4,136	2,264 7,860 3,366 2,600 1,820 2,074 2,912 2,912 2,296 2,802 2,390 6,996 2,054 3,092 5,130	最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大12インチ	マイクロスコープー体型マイクロマニピュレーターシステム シリコンウェハや金属薄板の加工(ガラスなどの透明材料はNG)、最小加工線幅:約70μm ウェハ上のパーティクル測定(数、大きさ) 光学式の膜厚測定 高速サンプリング可能なエリプソ 薄膜の厚さ、屈折率測定 触針式の表面形状測定    一般針式の表面形状測定   一般針式の表面形状測定   「パターン観察   パターン観察   パターン観察、デジタル画像保存、電動ステージ(PC制御可)、20~200倍、500~5000倍   両面アライメントの確認、ウェハ接合面のボイド評価等   3次元表面形状測定、DeepRIEのエッチ深さ測定、レーザ光/白色の切替可能、共焦点/非共焦点の切替可能   光学式の非接触深さ測定装置   デバイス内部の非破壊検査、ウェハ接合面の欠陥、ボイド評価等   X線を用いた非破壊内部観察
	F-19 F-20 G-01 G-02 G-03 G-04 G-05 G-06 G-07 G-08 G-10 G-11 G-12 G-13 G-14 G-15	TU-269 TU-270 TU-301 TU-302 TU-303 TU-304 TU-305 TU-306 TU-307 TU-308 TU-309 TU-310 TU-311 TU-312 TU-313 TU-314 TU-315	マイクロマニピュレータ ウォーターレーザ ウェハゴミ検査装置 膜厚計 卓上型エリプソ エリプソ Dektak 段差計 Tencor 段差計 金属顕微鏡 デジタル顕微鏡 赤外線顕微鏡 ホ外線顕微鏡 レーザ/白色共焦点顕微鏡 深さ測定装置 超音波顕微鏡 マイクロX線CT 熱電子SEM 断面SEM	マイクロサポート 澁谷工業 LAMICS AQL-1900 トプコン WM-3 ナノメトリクス NanoSpec3000 フォトニックラティス SE-101 アルバック - Dektak 8 Tencor AlphaStep ニコン L150、L200 キーエンス/クノーテクノクラフト - オリンパス/浜松ホトニクス - レーザーテック OPTELICS HYBRID LS-SD ユニオン光学 Hisomet インサイト IS-350 コムスキャンテクノ ScanXmate D160TS110 日立ハイテク S3700N 日立ハイテク S5000	1,936 6,732 2,728 2,112 1,320 1,606 2,376 2,332 2,002 2,288 1,914 5,610 1,606 2,464 4,004 4,290 5,962	2,574 8,954 3,630 2,794 1,760 2,134 3,146 3,102 2,662 3,036 2,552 7,480 2,134 3,278 5,324 5,698 7,942	3,102 10,758 4,356 3,366 2,112 2,574 3,784 3,740 3,212 3,652 3,080 8,976 2,574 3,938 6,402 6,842 9,548	1,870 6,908 2,816 2,156 1,408 1,672 2,420 2,420 2,420 2,046 2,288 1,936 5,654 1,606 2,442 4,136 4,224 6,006	2,264 7,860 3,366 2,600 1,820 2,074 2,912 2,912 2,296 2,802 2,390 6,996 2,054 3,092 5,130 5,188 6,804	最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大12インチ 最大12インチ	マイクロスコープー体型マイクロマニピュレーターシステム シリコンウェハや金属薄板の加工(ガラスなどの透明材料はNG)、最小加工線幅:約70μm ウェハ上のパーティクル測定(数、大きさ) 光学式の膜厚測定 高速サンプリング可能なエリプソ 薄膜の厚さ、屈折率測定 触針式の表面形状測定  触針式の表面形状測定  がターン観察 パターン観察 パターン観察 パターン観察、デジタル画像保存、電動ステージ(PC制御可)、20~200倍、500~5000倍 両面アライメントの確認、ウェハ接合面のボイド評価等 3次元表面形状測定、DeepRIEのエッチ深さ測定、レーザ光/白色の切替可能、共焦点/非共焦点の切替可能 光学式の非接触深さ測定装置 デバイス内部の非破壊検査、ウェハ接合面の欠陥、ボイド評価等 X線を用いた非破壊内部観察 EDX付、低真空モード付、光学画像ナビゲーション付 小片専用、インレンズ式の高分解能FESEM
測	F-19 F-20 G-01 G-02 G-03 G-04 G-05 G-06 G-07 G-08 G-10 G-11 G-12 G-13 G-14 G-15	TU-269 TU-270 TU-301 TU-302 TU-303 TU-304 TU-305 TU-306 TU-307 TU-308 TU-309 TU-310 TU-311 TU-312 TU-313 TU-314 TU-315	マイクロマニピュレータ ウォーターレーザ ウェハゴミ検査装置 膜厚計 卓上型エリプソ エリプソ Dektak 段差計 Tencor 段差計 金属顕微鏡 デジタル顕微鏡 赤外線顕微鏡  ホ外線顕微鏡 レーザ/白色共焦点顕微鏡 深さ測定装置 超音波顕微鏡 マイクロX線CT 熱電子SEM	マイクロサポート  澁谷工業 LAMICS AQL-1900 トプコン WM-3 ナノメトリクス NanoSpec3000 フォトニックラティス SE-101 アルバック - Dektak 8 Tencor AlphaStep ニコン L150、L200 キーエンス/クノーテクノクラフト - オリンパス/浜松ホトニクス - レーザーテック OPTELICS HYBRID LS-SD ユニオン光学 Hisomet インサイト IS-350 コムスキャンテクノ ScanXmate D160TS110 日立ハイテク S3700N	1,936 6,732 2,728 2,112 1,320 1,606 2,376 2,332 2,002 2,288 1,914 5,610 1,606 2,464 4,004 4,290	2,574 8,954 3,630 2,794 1,760 2,134 3,146 3,102 2,662 3,036 2,552 7,480 2,134 3,278 5,324 5,698	3,102 10,758 4,356 3,366 2,112 2,574 3,784 3,740 3,212 3,652 3,080 8,976 2,574 3,938 6,402 6,842 9,548	1,870 6,908 2,816 2,156 1,408 1,672 2,420 2,420 2,420 2,046 2,288 1,936 5,654 1,606 2,442 4,136 4,224	2,264 7,860 3,366 2,600 1,820 2,074 2,912 2,912 2,296 2,802 2,390 6,996 2,054 3,092 5,130 5,188 6,804	最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大12インチ 最大12インチ	マイクロスコープー体型マイクロマニピュレーターシステム シリコンウェハや金属薄板の加工(ガラスなどの透明材料はNG)、最小加工線幅:約70μm ウェハ上のパーティクル測定(数、大きさ) 光学式の膜厚測定 高速サンプリング可能なエリプソ 薄膜の厚さ、屈折率測定 触針式の表面形状測定   触針式の表面形状測定   がターン観察   パターン観察   パターン観察   パターン観察   パターン観察、デジタル画像保存、電動ステージ(PC制御可)、20~200倍、500~5000倍   両面アライメントの確認、ウェハ接合面のボイド評価等   3次元表面形状測定、DeepRIEのエッチ深さ測定、レーザ光/白色の切替可能、共焦点/非共焦点の切替可能   光学式の非接触深さ測定装置   デバイス内部の非破壊検査、ウェハ接合面の欠陥、ボイド評価等   X線を用いた非破壊内部観察   EDX付、低真空モード付、光学画像ナビゲーション付
測定	F-19 F-20 G-01 G-02 G-03 G-04 G-05 G-06 G-07 G-08 G-10 G-11 G-12 G-13 G-14 G-15 G-16	TU-269 TU-270 TU-301 TU-302 TU-303 TU-304 TU-305 TU-306 TU-307 TU-308 TU-310 TU-311 TU-312 TU-313 TU-314 TU-315 TU-316	マイクロマニピュレータ ウォーターレーザ ウェハゴミ検査装置 膜厚計 卓上型エリプソ エリプソ Dektak 段差計 Tencor 段差計 金属顕微鏡 デジタル顕微鏡 赤外線顕微鏡 ホ外線顕微鏡 レーザ/白色共焦点顕微鏡 深さ測定装置 超音波顕微鏡 マイクロX線CT 熱電子SEM 断面SEM	マイクロサポート 澁谷工業 LAMICS AQL-1900 トプコン WM-3 ナノメトリクス NanoSpec3000 フォトニックラティス SE-101 アルバック - Dektak 8 Tencor AlphaStep ニコン L150、L200 キーエンス/クノーテクノクラフト - オリンパス/浜松ホトニクス - レーザーテック OPTELICS HYBRID LS-SD ユニオン光学 Hisomet インサイト IS-350 コムスキャンテクノ ScanXmate D160TS110 日立ハイテク S3700N 日立ハイテク S5000	1,936 6,732 2,728 2,112 1,320 1,606 2,376 2,332 2,002 2,288 1,914 5,610 1,606 2,464 4,004 4,290 5,962	2,574 8,954 3,630 2,794 1,760 2,134 3,146 3,102 2,662 3,036 2,552 7,480 2,134 3,278 5,324 5,698 7,942	3,102 10,758 4,356 3,366 2,112 2,574 3,784 3,740 3,212 3,652 3,080 8,976 2,574 3,938 6,402 6,842 9,548 9,724	1,870 6,908 2,816 2,156 1,408 1,672 2,420 2,420 2,420 2,046 2,288 1,936 5,654 1,606 2,442 4,136 4,224 6,006	2,264 7,860 3,366 2,600 1,820 2,074 2,912 2,912 2,296 2,802 2,390 6,996 2,054 3,092 5,130 5,188 6,804 7,554	最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大12インチ 最大12インチ 最大12インチ 最大12インチ 最大12インチ	マイクロスコープー体型マイクロマニピュレーターシステム シリコンウェハや金属薄板の加工(ガラスなどの透明材料はNG)、最小加工線幅:約70μm ウェハ上のパーティクル測定(数、大きさ) 光学式の膜厚測定 高速サンプリング可能なエリプソ 薄膜の厚さ、屈折率測定 触針式の表面形状測定  脱針式の表面形状測定 パターン観察 パターン観察 パターン観察 パターン観察 パターンではい、ウェハ接合面のボイド評価等 3次元表面形状測定、DeepRIEのエッチ深さ測定、レーザ光/白色の切替可能、共焦点/非共焦点の切替可能 光学式の非接触深さ測定装置 デバイス内部の非破壊検査、ウェハ接合面の欠陥、ボイド評価等 X線を用いた非破壊内部観察 EDX付、低真空モード付、光学画像ナビゲーション付 小片専用、インレンズ式の高分解能FESEM 電界放出型SEM、EDX付 微細構造の高精度自動測長 6、8インチは自動搬送、4インチ以下は手動搬送
測定	F-19 F-20 G-01 G-02 G-03 G-04 G-05 G-06 G-07 G-08 G-10 G-11 G-12 G-13 G-14 G-15 G-16 G-17	TU-269 TU-270 TU-301 TU-302 TU-303 TU-304 TU-305 TU-306 TU-307 TU-308 TU-310 TU-311 TU-312 TU-313 TU-314 TU-315 TU-316 TU-317	マイクロマニピュレータ ウォーターレーザ ウェハゴミ検査装置 膜厚計 卓上型エリプソ エリプソ Dektak 段差計 Tencor 段差計 金属顕微鏡 デジタル顕微鏡 赤外線顕微鏡 レーザ/白色共焦点顕微鏡 深さ測定装置 超音波顕微鏡 マイクロX線CT 熱電子SEM 断面SEM JEOL FE-SEM	マイクロサポート  澁谷工業 LAMICS AQL-1900 トプコン WM-3 ナノメトリクス NanoSpec3000 フォトニックラティス SE-101 アルバック - Dektak 8 Tencor AlphaStep ニコン L150、L200 キーエンス/クノーテクノクラフト - オリンパス/浜松ホトニクス - レーザーテック OPTELICS HYBRID LS-SD ユニオン光学 Hisomet インサイト IS-350 コムスキャンテクノ ScanXmate D160TS110 日立ハイテク S3700N 日立ハイテク S5000 日本電子 JSM-6335F	1,936 6,732 2,728 2,112 1,320 1,606 2,376 2,332 2,002 2,288 1,914 5,610 1,606 2,464 4,004 4,290 5,962 6,072 18,062	2,574 8,954 3,630 2,794 1,760 2,134 3,146 3,102 2,662 3,036 2,552 7,480 2,134 3,278 5,324 5,698 7,942 8,096	3,102 10,758 4,356 3,366 2,112 2,574 3,784 3,740 3,212 3,652 3,080 8,976 2,574 3,938 6,402 6,842 9,548 9,724 28,886	1,870 6,908 2,816 2,156 1,408 1,672 2,420 2,420 2,420 2,046 2,288 1,936 5,654 1,606 2,442 4,136 4,224 6,006 6,160 18,810	2,264 7,860 3,366 2,600 1,820 2,074 2,912 2,912 2,296 2,802 2,390 6,996 2,054 3,092 5,130 5,188 6,804 7,554 21,088	最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大12インチ 最大12インチ 最大12インチ 最大12インチ 最大12インチ	マイクロスコープー体型マイクロマニピュレーターシステム シリコンウェハや金属薄板の加工(ガラスなどの透明材料はNG)、最小加工線幅:約70μm ウェハ上のパーティクル測定(数、大きさ) 光学式の膜厚測定 高速サンプリング可能なエリプソ 薄膜の厚さ、屈折率測定 触針式の表面形状測定    一般針式の表面形状測定   「パターン観察   「パターン観察   「パターン観察   「パターン観察   「アターン観察   「アッチョン・ロージー・ローの切替可能・共焦点/非共焦点の切替可能   大生により、アジー・アルー・ローの切替可能・大生には、アルー・アルー・ローの切替可能・大き、アルー・アルー・アルー・アルー・アルー・アルー・アルー・アルー・アルー・アルー・
測定	F-19 F-20 G-01 G-02 G-03 G-04 G-05 G-06 G-07 G-08 G-10 G-11 G-12 G-13 G-14 G-15 G-16 G-17 G-18	TU-269 TU-370 TU-301 TU-303 TU-304 TU-305 TU-306 TU-307 TU-308 TU-309 TU-310 TU-311 TU-312 TU-313 TU-314 TU-315 TU-315 TU-316	マイクロマニピュレータ ウォーターレーザ ウェハゴミ検査装置 膜厚計 卓上型エリプソ エリプソ Dektak 段差計 Tencor 段差計 金属顕微鏡 デジタル顕微鏡 赤外線顕微鏡 ルーザ/白色共焦点顕微鏡 深さ測定装置 超音波顕微鏡 マイクロX線CT 熱電子SEM 断面SEM JEOL FE-SEM 別長SEM	マイクロサポート 澁谷工業 LAMICS AQL-1900 トプコン WM-3 ナノメトリクス NanoSpec3000 フォトニックラティス SE-101 アルバック - Dektak 8 Tencor AlphaStep ニコン L150、L200 キーエンス/クノーテクノクラフト - オリンパス/浜松ホトニクス - レーザーテック OPTELICS HYBRID LS-SD ユニオン光学 Hisomet インサイト IS-350 コムスキャンテクノ ScanXmate D160TS110 日立ハイテク S3700N 日立ハイテク S5000 日本電子 JSM-6335F 日立ハイテク CS4800 サンユー電子 SC-701MkII	1,936 6,732 2,728 2,112 1,320 1,606 2,376 2,332 2,002 2,288 1,914 5,610 1,606 2,464 4,004 4,290 5,962 6,072 18,062 1,848	2,574 8,954 3,630 2,794 1,760 2,134 3,146 3,102 2,662 3,036 2,552 7,480 2,134 3,278 5,324 5,698 7,942 8,096 24,068 2,442	3,102 10,758 4,356 3,366 2,112 2,574 3,784 3,740 3,212 3,652 3,080 8,976 2,574 3,938 6,402 6,842 9,548 9,724 28,886 2,948	1,870 6,908 2,816 2,156 1,408 1,672 2,420 2,420 2,420 2,046 2,288 1,936 5,654 1,606 2,442 4,136 4,224 6,006 6,160 18,810 1,870	2,264 7,860 3,366 2,600 1,820 2,074 2,912 2,912 2,296 2,802 2,390 6,996 2,054 3,092 5,130 5,188 6,804 7,554 21,088 2,644	最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大12インチ 最大12インチ 最大12インチ 最大12インチ 最大12インチ	マイクロスコープー体型マイクロマニピュレーターシステム シリコンウェハや金属薄板の加工(ガラスなどの透明材料はNG)、最小加工線幅:約70μm ウェハ上のパーティクル測定(数、大きさ) 光学式の膜厚測定 高速サンプリング可能なエリプソ 薄膜の厚さ、屈折率測定 触針式の表面形状測定  触針式の表面形状測定  がターン観察  パターン観察  デバイストの確認、ウェハ接合面のボイド評価等  光学式の非接触深さ測定装置  デバイス内部の非破壊検査、ウェハ接合面の欠陥、ボイド評価等  X線を用いた非破壊内部観察  EDX付、低真空モード付、光学画像ナビゲーション付  小片専用、インレンズ式の高分解能FESEM 電界放出型SEM、EDX付  微細構造の高精度自動測長 6、8インチは自動搬送、4インチ以下は手動搬送  計測再現性: 1nm(3σ)  SEM観察試料のPtコーティング
測定	F-19 F-20 G-01 G-02 G-03 G-04 G-05 G-06 G-07 G-08 G-10 G-11 G-12 G-13 G-14 G-15 G-16 G-17 G-18 G-19	TU-269 TU-370 TU-301 TU-303 TU-304 TU-305 TU-306 TU-307 TU-308 TU-309 TU-310 TU-311 TU-312 TU-313 TU-314 TU-315 TU-315 TU-316 TU-317 TU-318 TU-319	マイクロマニピュレータ ウォーターレーザ ウェハゴミ検査装置 膜厚計 卓上型エリプソ エリプソ Dektak 段差計 Tencor 段差計 金属顕微鏡 デジタル顕微鏡 赤外線顕微鏡 ホ外線顕微鏡 レーザ/白色共焦点顕微鏡 深さ測定装置 超音波顕微鏡 マイクロX線CT 熱電子SEM 断面SEM JEOL FE-SEM 別長SEM	マイクロサポート  澁谷工業 LAMICS AQL-1900 トプコン WM-3 ナノメトリクス NanoSpec3000 フォトニックラティス SE-101 アルバック - Dektak 8 Tencor AlphaStep ニコン L150、L200 キーエンス/クノーテクノクラフト - オリンパス/浜松ホトニクス - レーザーテック OPTELICS HYBRID LS-SD ユニオン光学 Hisomet インサイト IS-350 コムスキャンテクノ ScanXmate D160TS110 日立ハイテク S3700N 日立ハイテク S5000 日本電子 JSM-6335F	1,936 6,732 2,728 2,112 1,320 1,606 2,376 2,332 2,002 2,288 1,914 5,610 1,606 2,464 4,004 4,290 5,962 6,072 18,062 1,848 3,674	2,574 8,954 3,630 2,794 1,760 2,134 3,146 3,102 2,662 3,036 2,552 7,480 2,134 3,278 5,324 5,698 7,942 8,096 24,068 2,442 4,884	3,102 10,758 4,356 3,366 2,112 2,574 3,784 3,740 3,212 3,652 3,080 8,976 2,574 3,938 6,402 6,842 9,548 9,724 28,886 2,948 5,874	1,870 6,908 2,816 2,156 1,408 1,672 2,420 2,420 2,420 2,046 2,288 1,936 5,654 1,606 2,442 4,136 4,224 6,006 6,160 18,810	2,264 7,860 3,366 2,600 1,820 2,074 2,912 2,912 2,296 2,802 2,390 6,996 2,054 3,092 5,130 5,188 6,804 7,554 21,088 2,644 4,112	最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大12インチ 最大12インチ 最大12インチ 最大12インチ 最大12インチ 最大12インチ 最大12インチ 最大12インチ 最大12インチ 最大12インチ 最大12インチ	マイクロスコープー体型マイクロマニピュレーターシステム シリコンウェハや金属薄板の加工(ガラスなどの透明材料はNG)、最小加工線幅:約70μm ウェハ上のパーティクル測定(数、大きさ) 光学式の膜厚測定 高速サンプリング可能なエリプソ 薄膜の厚さ、屈折率測定 触針式の表面形状測定    一般針式の表面形状測定   「パターン観察   「パターン観察   「パターン観察   「パターン観察   「アターン観察   「アッチョン・ロージー・ローの切替可能・共焦点/非共焦点の切替可能   大生により、アジー・アルー・ローの切替可能・大生には、アルー・アルー・ローの切替可能・大き、アルー・アルー・アルー・アルー・アルー・アルー・アルー・アルー・アルー・アルー・
測定	F-19 F-20 G-01 G-02 G-03 G-04 G-05 G-06 G-07 G-08 G-10 G-11 G-12 G-13 G-14 G-15 G-16 G-17 G-18 G-19 G-19	TU-269 TU-270 TU-301 TU-302 TU-304 TU-305 TU-306 TU-307 TU-308 TU-309 TU-310 TU-311 TU-312 TU-313 TU-314 TU-315 TU-315 TU-316 TU-317 TU-318 TU-319 TU-320	マイクロマニピュレータ ウォーターレーザ ウェハゴミ検査装置 膜厚計 卓上型エリプソ エリプソ Dektak 段差計 Tencor 段差計 金属顕微鏡 デジタル顕微鏡 赤外線顕微鏡 ホ外線顕微鏡 レーザ/白色共焦点顕微鏡 深さ測定装置 超音波顕微鏡 マイクロX線CT 熱電子SEM 断面SEM JEOL FE-SEM 別長SEM クイックコータ パーク・システムズAFM 4探針測定装置	マイクロサポート 澁谷工業 LAMICS AQL-1900 トプコン WM-3 ナノメトリクス NanoSpec3000 フォトニックラティス SE-101 アルバック - Dektak 8 Tencor AlphaStep ニコン L150、L200 キーエンス/クノーテクノクラフト - オリンパス/浜松ホトニクス - レーザーテック OPTELICS HYBRID LS-SD ユニオン光学 Hisomet インサイト IS-350 コムスキャンテクノ ScanXmate D160TS110 日立ハイテク S3700N 日立ハイテク S5000 日本電子 JSM-6335F 日立ハイテク CS4800 サンユー電子 SC-701MkII	1,936 6,732 2,728 2,112 1,320 1,606 2,376 2,332 2,002 2,288 1,914 5,610 1,606 2,464 4,004 4,290 5,962 6,072 18,062 1,848 3,674 1,518	2,574 8,954 3,630 2,794 1,760 2,134 3,146 3,102 2,662 3,036 2,552 7,480 2,134 3,278 5,324 5,698 7,942 8,096 24,068 2,442 4,884 2,002	3,102 10,758 4,356 3,366 2,112 2,574 3,784 3,740 3,212 3,652 3,080 8,976 2,574 3,938 6,402 6,842 9,548 9,724 28,886 2,948 5,874 2,420	1,870 6,908 2,816 2,156 1,408 1,672 2,420 2,420 2,420 2,046 2,288 1,936 5,654 1,606 2,442 4,136 4,224 6,006 6,160 18,810 1,870 3,630 1,606	2,264 7,860 3,366 2,600 1,820 2,074 2,912 2,912 2,912 2,296 2,802 2,390 6,996 2,054 3,092 5,130 5,188 6,804 7,554 21,088 2,644 4,112 2,180	最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大12インチ 最大12インチ 最大12インチ 最大12インチ 最大12インチ 最大12インチ 最大12インチ 最大12インチ 最大12インチ 最大12インチ 最大12インチ 最大6インチ	マイクロスコーブー体型マイクロマニピュレーターシステム シリコンウェハや金属薄板の加工(ガラスなどの透明材料はNG)、最小加工線幅:約70μm ウェハ上のパーティクル測定(数、大きさ) 光学式の膜厚測定 高速サンプリング可能なエリプソ 薄膜の厚さ、屈折率測定 触針式の表面形状測定  がターン観察 パターン観察 アデタル画像保存、電動ステージ(PC制御可)、20~200倍、500~5000倍 両面アライメントの確認、ウェリ接合面のポイド評価等 3次元表面形状測定、DeepRIEのエッチ深さ測定、レーザ光/白色の切替可能、共焦点/非共焦点の切替可能 光学式の非接触深さ測定装置 デバイス内部の非破壊検査、ウェハ接合面の欠陥、ポイド評価等 X線を用いた非破壊内部観察 EDX付、低真空モード付、光学画像ナビケーション付 小片専用、インレンズ式の高分解能FESEM 電界放出型SEM、EDX付 微細構造の高精度自動測長 6、8インチは自動搬送、4インチ以下は手動搬送 計測再現性:1mm(3σ) SEM観察試料のPtコーティング 小片から8インチまで対応する原子間力顕微鏡 ウェハ抵抗率などの測定
測定	F-19 F-20 G-01 G-02 G-03 G-04 G-05 G-06 G-07 G-08 G-10 G-11 G-12 G-13 G-14 G-15 G-16 G-17 G-18 G-19 G-19 G-10 G-11	TU-269 TU-370 TU-301 TU-303 TU-304 TU-305 TU-306 TU-307 TU-308 TU-309 TU-310 TU-311 TU-312 TU-313 TU-314 TU-315 TU-315 TU-316 TU-317 TU-317 TU-318 TU-319 TU-320 TU-321	マイクロマニピュレータ ウォーターレーザ ウェハゴミ検査装置 膜厚計 卓上型エリプソ エリプソ Dektak 段差計 Tencor 段差計 金属顕微鏡 デジタル顕微鏡 赤外線顕微鏡 赤外線顕微鏡 ホ外線顕微鏡 マイクロX線CT 熱電子SEM 断面SEM JEOL FE-SEM 別長SEM クイックコータ パーク・システムズAFM 4探針測定装置 拡がり抵抗測定装置	ボ谷工業 LAMICS AQL-1900 トプコン WM-3 ナノメトリクス NanoSpec3000 フォトニックラティス SE-101 アルバック - Dektak 8 Tencor AlphaStep ニコン L150、L200 キーエンス/クノーテクノクラフト - オリンパス/浜松ホトニクス - レーザーテック OPTELICS HYBRID LS-SD ユニオン光学 Hisomet インサイト IS-350 コムスキャンテクノ ScanXmate D160TS110 日立ハイテク S3700N 日立ハイテク S5000 日本電子 JSM-6335F 日立ハイテク CS4800 サンユー電子 SC-701MkII パーク・システムズ NX20 Solid State Measurement SSM150	1,936 6,732 2,728 2,112 1,320 1,606 2,376 2,332 2,002 2,288 1,914 5,610 1,606 2,464 4,004 4,290 5,962 6,072 18,062 1,848 3,674 1,518 2,882	2,574 8,954 3,630 2,794 1,760 2,134 3,146 3,102 2,662 3,036 2,552 7,480 2,134 3,278 5,324 5,698 7,942 8,096 24,068 2,442 4,884 2,002 3,828	3,102 10,758 4,356 3,366 2,112 2,574 3,784 3,740 3,212 3,652 3,080 8,976 2,574 3,938 6,402 6,842 9,548 9,724 28,886 2,948 5,874 2,420 4,598	1,870 6,908 2,816 2,156 1,408 1,672 2,420 2,420 2,420 2,046 2,288 1,936 5,654 1,606 2,442 4,136 4,224 6,006 6,160 18,810 1,870 3,630 1,606 2,970	2,264 7,860 3,366 2,600 1,820 2,074 2,912 2,912 2,296 2,802 2,390 6,996 2,054 3,092 5,130 5,188 6,804 7,554 21,088 2,644 4,112 2,180 4,118	最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大12インチ 最大12インチ 最大12インチ 最大12インチ よりよりようながらない。 最大12インチ 最大12インチ よりよりない。 最大12インチ よりない。 最大12インチ よりない。 最大12インチ よりない。 よりなり。 よりなり。 よりない。 よりなり。 よりない。 よりなり。 よりなり。 よりない。 よりない。 よりない。 よりない。 よりなり。 よりなり。 よりない。 よりない。 よりなり。 よりなり。 よりない。 よりない。 よりない。 よりなり。 よりない。 よりない。 よりない。 よりない。 よりない。 よりない。 よりない。 よりない。 よりない。 よりな。 よりない。 よりな。 よりない。 よりない。 よりない。 よりな。 よりな。 よりな。 よりな。 よりな。 よりな。 よりな。 よりな	マイクロスコープー体型マイクロマニピュレーターシステム シリコンウェハや金属薄板の加工(ガラスなどの透明材料はNG)、最小加工線幅:約70μm ウェハ上のパーティクル測定(数、大きさ) 光学式の膜厚測定 高速サンプリング可能なエリプソ 薄膜の厚さ、屈折率測定 触針式の表面形状測定  がターン観察 パターン観察 ボイト評価等 メ線を用いた非破壊内部観察 EDX付、低真空モード付、光学画像ナピゲーション付 小片専用、インレンズ式の高分解能FESEM 電界放出型SEM、EDX付 微細構造の高精度自動測長 6、8インチは自動搬送、4インチ以下は手動搬送 計測再現性:1nm(3o) SEM観察試料のPtコーティング 小片から8インチまで対応する原子間力顕微鏡 フェバ抵抗率などの測定 不純物濃度プロファイルの測定、ウェバを小片にして端面を斜め研磨した後に測定
測定	F-19 F-20 G-01 G-02 G-03 G-04 G-05 G-06 G-07 G-08 G-10 G-11 G-12 G-13 G-14 G-15 G-16 G-17 G-18 G-17 G-18 G-19 G-20 G-21	TU-269 TU-370 TU-301 TU-303 TU-304 TU-305 TU-306 TU-307 TU-308 TU-309 TU-310 TU-311 TU-312 TU-313 TU-314 TU-315 TU-315 TU-316 TU-317 TU-317 TU-317 TU-318 TU-319 TU-320 TU-321	マイクロマニピュレータ ウォーターレーザ ウェハゴミ検査装置 膜厚計 卓上型エリプソ エリプソ Dektak 段差計 Tencor 段差計 金属顕微鏡 デジタル顕微鏡 赤外線顕微鏡 レーザ/白色共焦点顕微鏡 深さ測定装置 超音波顕微鏡 マイクロX線CT 熱電子SEM 断面SEM JEOL FE-SEM 別長SEM クイックコータ パーク・システムズAFM 4探針測定装置 拡がり抵抗測定装置 拡がり抵抗測定装置 括方のエスを表す。	ボ谷工業 LAMICS AQL-1900 トプコン WM-3 ナノメトリクス NanoSpec3000 フォトニックラティス SE-101 アルバック - Dektak 8 Tencor AlphaStep ニコン L150、L200 キーエンス/クノーテクノクラフト - オリンパス/浜松ホトニクス - レーザーテック OPTELICS HYBRID LS-SD ユニオン光学 Hisomet インサイト IS-350 コムスキャンテクノ ScanXmate D160TS110 日立ハイテク S3700N 日立ハイテク S3700N 日立ハイテク S5000 日本電子 JSM-6335F 日立ハイテク CS4800 サンユー電子 SC-701MkII パーク・システムズ NX20 Solid State Measurement SSM150 SII SMI9200	1,936 6,732 2,728 2,112 1,320 1,606 2,376 2,332 2,002 2,288 1,914 5,610 1,606 2,464 4,004 4,290 5,962 6,072 18,062 1,848 3,674 1,518	2,574 8,954 3,630 2,794 1,760 2,134 3,146 3,102 2,662 3,036 2,552 7,480 2,134 3,278 5,324 5,698 7,942 8,096 24,068 2,442 4,884 2,002	3,102 10,758 4,356 3,366 2,112 2,574 3,784 3,740 3,212 3,652 3,080 8,976 2,574 3,938 6,402 6,842 9,548 9,724 28,886 2,948 5,874 2,420	1,870 6,908 2,816 2,156 1,408 1,672 2,420 2,420 2,420 2,046 2,288 1,936 5,654 1,606 2,442 4,136 4,224 6,006 6,160 18,810 1,870 3,630 1,606	2,264 7,860 3,366 2,600 1,820 2,074 2,912 2,912 2,912 2,296 2,802 2,390 6,996 2,054 3,092 5,130 5,188 6,804 7,554 21,088 2,644 4,112 2,180	最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大12インチ 最大12インチ 最大12インチ 最大12インチ よりよりようながらない。 最大12インチ 最大12インチ よりよりない。 最大12インチ よりない。 最大12インチ よりない。 最大12インチ よりない。 よりなり。 よりなり。 よりない。 よりなり。 よりない。 よりなり。 よりなり。 よりない。 よりない。 よりない。 よりない。 よりなり。 よりなり。 よりない。 よりない。 よりなり。 よりなり。 よりない。 よりない。 よりない。 よりなり。 よりない。 よりない。 よりない。 よりない。 よりない。 よりない。 よりない。 よりない。 よりない。 よりな。 よりない。 よりな。 よりない。 よりない。 よりない。 よりな。 よりな。 よりな。 よりな。 よりな。 よりな。 よりな。 よりな	マイクロスコーブー体型マイクロマニピュレーターシステム シリコンウェハや金属薄板の加工(ガラスなどの透明材料はNG)、最小加工線幅:約70μm ウェハ上のパーティクル測定(数、大きさ) 光学式の膜厚測定 高速サンプリング可能なエリプソ 薄膜の厚さ、屈折率測定 触針式の表面形状測定  がターン観察 バターン観察 ボジッル画像保存、電動ステージ(PC制御可)、20~200倍、500~5000倍 両面アライメントの確認、ウェリ接合面のボイド評価等 3次元表面形状測定、DeepRIEのエッチ深さ測定、レーザ光/白色の切替可能、共焦点/非共焦点の切替可能 光学式の非接触深さ測定装置 デバイス内部の非破壊検査、ウェハ接合面の欠陥、ポイド評価等 X線を用いた非破壊内部観察 EDX付、低真空モード付、光学画像ナビケーション付 小片専用、インレンズ式の高分解能FESEM 電界放出型SEM、EDX付 微細構造の高精度自動測長 6、8インチは自動搬送、4インチ以下は手動搬送 計測再現性:1mm(3σ) SEM観察試料のPtコーティング 小片から8インチまで対応する原子間力顕微鏡 ウェハ抵抗率などの測定
測定	F-19 F-20 G-01 G-02 G-03 G-04 G-05 G-06 G-07 G-08 G-10 G-11 G-12 G-13 G-14 G-15 G-16 G-17 G-18 G-17 G-18 G-19 G-20 G-21	TU-269 TU-370 TU-301 TU-303 TU-304 TU-305 TU-306 TU-307 TU-308 TU-309 TU-310 TU-311 TU-312 TU-313 TU-314 TU-315 TU-315 TU-316 TU-317 TU-317 TU-318 TU-319 TU-320 TU-321	マイクロマニピュレータ ウォーターレーザ ウェハゴミ検査装置 膜厚計 卓上型エリプソ エリプソ Dektak 段差計 Tencor 段差計 金属顕微鏡 デジタル顕微鏡 赤外線顕微鏡 レーザ/白色共焦点顕微鏡 深さ測定装置 超音波顕微鏡 マイクロX線CT 熱電子SEM 断面SEM JEOL FE-SEM 別長SEM クイックコータ パーク・システムズAFM 4探針測定装置 拡がり抵抗測定装置 拡がり抵抗測定装置 括方のエスを表す。	ボ谷工業 LAMICS AQL-1900 トプコン WM-3 ナノメトリクス NanoSpec3000 フォトニックラティス SE-101 アルバック - Dektak 8 Tencor AlphaStep ニコン L150、L200 キーエンス/クノーテクノクラフト - オリンパス/浜松ホトニクス - レーザーテック OPTELICS HYBRID LS-SD ユニオン光学 Hisomet インサイト IS-350 コムスキャンテクノ ScanXmate D160TS110 日立ハイテク S3700N 日立ハイテク S5000 日本電子 JSM-6335F 日立ハイテク CS4800 サンユー電子 SC-701MkII パーク・システムズ NX20 Solid State Measurement SSM150	1,936 6,732 2,728 2,112 1,320 1,606 2,376 2,332 2,002 2,288 1,914 5,610 1,606 2,464 4,004 4,290 5,962 6,072 18,062 1,848 3,674 1,518 2,882	2,574 8,954 3,630 2,794 1,760 2,134 3,146 3,102 2,662 3,036 2,552 7,480 2,134 3,278 5,324 5,698 7,942 8,096 24,068 2,442 4,884 2,002 3,828	3,102 10,758 4,356 3,366 2,112 2,574 3,784 3,740 3,212 3,652 3,080 8,976 2,574 3,938 6,402 6,842 9,548 9,724 28,886 2,948 5,874 2,420 4,598	1,870 6,908 2,816 2,156 1,408 1,672 2,420 2,420 2,420 2,046 2,288 1,936 5,654 1,606 2,442 4,136 4,224 6,006 6,160 18,810 1,870 3,630 1,606 2,970	2,264 7,860 3,366 2,600 1,820 2,074 2,912 2,912 2,296 2,802 2,390 6,996 2,054 3,092 5,130 5,188 6,804 7,554 21,088 2,644 4,112 2,180 4,118 12,314	最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大12インチ 最大12インチ 最大12インチ 最大12インチ よりよりよりようない。 最大12インチ 最大12インチ 最大12インチ よりよります。 最大12インチ 最大12インチ 最大12インチ よりよります。 最大12インチ よります。 最大12インチ よります。 最大12インチ よります。 最大12インチ よります。 最大12インチ よります。 より。 より。 より。 より。 より。 より。 より。 より。 より。 より	マイクロスコープー体型マイクロマニピュレーターシステム シリコンウェハや金属薄板の加工(ガラスなどの透明材料はNG)、最小加工線幅:約70μm ウェハ上のパーティクル測定(数、大きさ) 光学式の膜厚測定 高速サンプリング可能なエリプソ 薄膜の厚さ、屈折率測定 触針式の表面形状測定  がターン観察 パターン観察 ボギオの非接触深さ測定装置 デバイス内部の非破壊検査、ウェハ接合面の欠陥、ボイド評価等 X線を用いた非破壊内部観察 EDX付、低真空モード付、光学画像ナピゲーション付 小片専用、インレンズ式の高分解能FESEM 電界放出型SEM、EDX付 微細構造の高精度自動測長 6、8インチは自動搬送、4インチ以下は手動搬送 計測再現性: 1nm(3o) SEM観察試料のPtコーティング 小片から8インチまで対応する原子間力顕微鏡 ウェハ抵抗率などの測定 不純物濃度プロファイルの測定、ウェハを小片にして端面を斜め研磨した後に測定
測定	F-19 F-20 G-01 G-02 G-03 G-04 G-05 G-06 G-07 G-08 G-10 G-11 G-12 G-13 G-14 G-15 G-16 G-17 G-18 G-19 G-20 G-20 G-21 G-22	TU-269 TU-270 TU-301 TU-302 TU-304 TU-305 TU-306 TU-307 TU-308 TU-309 TU-310 TU-311 TU-312 TU-313 TU-314 TU-315 TU-315 TU-316 TU-317 TU-318 TU-317 TU-320 TU-320 TU-321 TU-322 TU-323	マイクロマニピュレータ ウォーターレーザ ウェハゴミ検査装置 膜厚計 卓上型エリプソ エリプソ Dektak 段差計 Tencor 段差計 金属顕微鏡 デジタル顕微鏡 赤外線顕微鏡 ホ外線顕微鏡 なつが、白色共焦点顕微鏡 マイクロX線CT 熱電子SEM 断面SEM JEOL FE-SEM 別長SEM クイックコータ パーク・システムズAFM 4探針測定装置 拡がり抵抗測定装置 拡がり抵抗測定装置 活線集束ビーム超音波材料解析	マイクロサポート	1,936 6,732 2,728 2,112 1,320 1,606 2,376 2,332 2,002 2,288 1,914 5,610 1,606 2,464 4,004 4,290 5,962 6,072 18,062 1,848 3,674 1,518 2,882 10,010	2,574 8,954 3,630 2,794 1,760 2,134 3,146 3,102 2,662 3,036 2,552 7,480 2,134 3,278 5,324 5,698 7,942 8,096 24,068 2,442 4,884 2,002 3,828 13,332	3,102 10,758 4,356 3,366 2,112 2,574 3,784 3,740 3,212 3,652 3,080 8,976 2,574 3,938 6,402 6,842 9,548 9,724 28,886 2,948 5,874 2,420 4,598 16,016	1,870 6,908 2,816 2,156 1,408 1,672 2,420 2,420 2,420 2,046 2,288 1,936 5,654 1,606 2,442 4,136 4,224 6,006 6,160 18,810 1,870 3,630 1,606 2,970 10,670	2,264 7,860 3,366 2,600 1,820 2,074 2,912 2,912 2,912 2,296 2,802 2,390 6,996 2,054 3,092 5,130 5,188 6,804 7,554 21,088 2,644 4,112 2,180 4,118 12,314 12,910	最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大12インチ 最大12インチ 最大12インチ 最大12インチ 小 最大4インチ 最大8インチ 最大8インチ 最大8インチ	マイクロスコープー体型マイクロマニピュレーターシステム シリコンウェハや金属薄板の加工(ガラスなどの透明材料はNG)、最小加工線幅:約70μm ウェハ上のパーティクル測定(数、大きさ) 光学式の膜厚測定 高速サンプリング可能なエリプソ 薄膜の厚き、屈折率測定 触針式の表面形状測定  触針式の表面形状測定  がターン観察、デジタル画像保存、電動ステージ(PC制御可)、20~200倍、500~5000倍 両面アライメントの確認、ウェハ接合面のポイド評価等 3次元表面形状測定、DeepRIEのエッチ深き測定、レーザ光/白色の切替可能、共焦点/非共焦点の助替可能 光学式の非接触深さ測定装置 デバイス内部の非破壊検査、ウェハ接合面の欠陥、ポイド評価等 X線を用いた非破壊内部観察 EDX付、低真空モード付、光学画像ナピケーション付 小片専用、インレンズ式の高分解能FESEM 電界放出型SEM、EDX付 微細構造の高精度自動測長 6、8インチは自動搬送、4インチ以下は手動搬送 計測再現性:1nm(30) SEM観察試料のPtコーティング 小片から8インチまで対応する原子間カ顕微鏡 ウェハ抵抗率などの測定 不純物濃度プロファイルの測定、ウェハを小片にして端面を斜め研磨した後に測定 集束イオンビームによる微小部分のエッチング、SEM観察用断面作製
測定	F-19 F-20 G-01 G-02 G-03 G-04 G-05 G-06 G-07 G-08 G-10 G-11 G-12 G-13 G-14 G-15 G-16 G-17 G-18 G-19 G-20 G-20 G-21 G-22 G-23 G-24	TU-269 TU-270 TU-301 TU-302 TU-303 TU-305 TU-306 TU-307 TU-308 TU-309 TU-310 TU-311 TU-312 TU-313 TU-314 TU-315 TU-315 TU-316 TU-317 TU-318 TU-317 TU-318 TU-319 TU-320 TU-321 TU-322 TU-323 TU-324	マイクロマニピュレータ ウォーターレーザ ウェハゴミ検査装置 膜厚計 卓上型エリプソ エリプソ Dektak 段差計 Tencor 段差計 金属顕微鏡 デジタル顕微鏡 赤外線顕微鏡 ホ外線顕微鏡 なつが、白色共焦点顕微鏡 マイクロX線CT 熱電子SEM 断面SEM JEOL FE-SEM 別長SEM クイックコータ パーク・システムズAFM 4探針測定装置 拡がり抵抗測定装置 括別ないでは、おいのでは、対しては、対しては、対しては、対しては、対しては、対しては、対しては、対しには、対しには、対しには、対しには、対しには、対しには、対しには、対しに	マイクロサポート	1,936 6,732 2,728 2,112 1,320 1,606 2,376 2,332 2,002 2,288 1,914 5,610 1,606 2,464 4,004 4,290 5,962 6,072 18,062 1,848 3,674 1,518 2,882 10,010 10,648 3,696	2,574 8,954 3,630 2,794 1,760 2,134 3,146 3,102 2,662 3,036 2,552 7,480 2,134 3,278 5,324 5,698 7,942 8,096 24,068 2,442 4,884 2,002 3,828 13,332 14,190 4,928	3,102 10,758 4,356 3,366 2,112 2,574 3,784 3,740 3,212 3,652 3,080 8,976 2,574 3,938 6,402 6,842 9,548 9,724 28,886 2,948 5,874 2,420 4,598 16,016 17,028 5,918	1,870 6,908 2,816 2,156 1,408 1,672 2,420 2,420 2,046 2,288 1,936 5,654 1,606 2,442 4,136 4,224 6,006 6,160 18,810 1,870 3,630 1,606 2,970 10,670 10,736 3,696	2,264 7,860 3,366 2,600 1,820 2,074 2,912 2,912 2,296 2,802 2,390 6,996 2,054 3,092 5,130 5,188 6,804 7,554 21,088 2,644 4,112 2,180 4,118 12,314 12,910 5,636	最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大12インチ 最大12インチ 最大8インチ 最大8インチ 最大8インチ 最大8インチ 最大8インチ 最大8インチ 最大8インチ 最大8インチ 最大8インチ 最大8インチ	マイクロスコープー体型マイクロマニピュレーターシステム シリコンウェハや金属薄板の加工 (ガラスなどの透明材料はNG)、最小加工線幅:約70μm ウェハ上のパーティクル測定 (数、大きさ) 光学式の膜厚測定 高速サンブリング可能なエリブソ 薄膜の厚さ、屈折率測定 触針式の表面形状測定 触針式の表面形状測定 にクーン観察 パターン観察 パターン観察 パターン観察 パターン観察、デジタル画像保存、電動ステージ (PC制御可)、20~200倍、500~5000倍 両面アライメントの確認、ウェハ接合面のボイド評価等 3次元表面形状測定、DeepRIEのエッチ深さ測定、レーザ光/白色の切替可能、共焦点/非共焦点の切替可能 光学式の非接触深さ測定装置 デバイス内部の非破壊検査、ウェハ接合面の欠陥、ボイド評価等 X線を用いた非破壊内部観察 EDX付、低真空モード付、光学画像ナビゲーション付 小片専用、インレンズ式の高分解能FESEM 電界放出型SEM、EDX付 微細構造の高精度自動測長 6、8インチは自動搬送、4インチ以下は手動搬送 計測再現性:1nm(3σ) SEM観察試料のPCコーティング 小片から8インチまで対応する原子間力顕微鏡 ウェハ抵抗率などの測定 不純物濃度プロファイルの測定、ウェハを小片にして端面を斜め研磨した後に測定 集束イオンビームによる微小部分のエッチング、SEM観察用断面作製 X線回折測定、1000℃までの高温環境での測定可能 固体試料の漏洩弾性表面波(LSAW)速度測定
測定	F-19 F-20 G-01 G-02 G-03 G-04 G-05 G-06 G-07 G-08 G-10 G-11 G-12 G-13 G-14 G-15 G-16 G-17 G-18 G-19 G-20 G-20 G-21 G-22 G-23 G-24	TU-269 TU-270 TU-301 TU-302 TU-303 TU-305 TU-306 TU-307 TU-308 TU-309 TU-310 TU-311 TU-312 TU-313 TU-314 TU-315 TU-315 TU-316 TU-317 TU-316 TU-317 TU-318 TU-317 TU-320 TU-321 TU-322 TU-323 TU-324	マイクロマニピュレータ ウォーターレーザ ウェハゴミ検査装置 膜厚計 卓上型エリプソ エリプソ Dektak 段差計 Tencor 段差計 金属顕微鏡 デジタル顕微鏡 赤外線顕微鏡 ホ外線顕微鏡 なつが、白色共焦点顕微鏡 マイクロX線CT 熱電子SEM 断面SEM JEOL FE-SEM 別長SEM クイックコータ パーク・システムズAFM 4探針測定装置 拡がり抵抗測定装置 拡がり抵抗測定装置 活線集束ビーム超音波材料解析	マイクロサポート	1,936 6,732 2,728 2,112 1,320 1,606 2,376 2,332 2,002 2,288 1,914 5,610 1,606 2,464 4,004 4,290 5,962 6,072 18,062 1,848 3,674 1,518 2,882 10,010 10,648	2,574 8,954 3,630 2,794 1,760 2,134 3,146 3,102 2,662 3,036 2,552 7,480 2,134 3,278 5,324 5,698 7,942 8,096 24,068 2,442 4,884 2,002 3,828 13,332 14,190	3,102 10,758 4,356 3,366 2,112 2,574 3,784 3,740 3,212 3,652 3,080 8,976 2,574 3,938 6,402 6,842 9,548 9,724 28,886 2,948 5,874 2,420 4,598 16,016 17,028	1,870 6,908 2,816 2,156 1,408 1,672 2,420 2,420 2,420 2,046 2,288 1,936 5,654 1,606 2,442 4,136 4,224 6,006 6,160 18,810 1,870 3,630 1,606 2,970 10,670 10,736	2,264 7,860 3,366 2,600 1,820 2,074 2,912 2,912 2,296 2,802 2,390 6,996 2,054 3,092 5,130 5,188 6,804 7,554 21,088 2,644 4,112 2,180 4,118 12,314 12,910 5,636	最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大12インチ 最大12インチ 最大8インチ 最大8インチ 最大8インチ 最大8インチ 最大8インチ 最大8インチ 最大8インチ 最大8インチ 最大8インチ 最大8インチ	マイクロスコープー体型マイクロマニピュレーターシステム シリコンウェハや金属薄板の加工(ガラスなどの透明材料はNG)、最小加工線幅:約70μm ウェハ上のパーティクル測定(数、大きさ) 光学式の膜厚測定 高速サンプリング可能なエリプソ 薄膜の厚き、屈折率測定 触針式の表面形状測定  (
測定	F-19 F-20 G-01 G-02 G-03 G-04 G-05 G-06 G-07 G-08 G-10 G-11 G-12 G-13 G-14 G-15 G-16 G-17 G-18 G-17 G-18 G-19 G-20 G-21 G-20 G-21 G-22 G-23 G-24 G-25	TU-269 TU-270 TU-301 TU-302 TU-304 TU-305 TU-306 TU-307 TU-308 TU-309 TU-310 TU-311 TU-312 TU-313 TU-314 TU-315 TU-315 TU-316 TU-317 TU-316 TU-317 TU-318 TU-317 TU-321 TU-322 TU-323 TU-323	マイクロマニピュレータ ウォーターレーザ ウェハゴミ検査装置 膜厚計 卓上型エリプソ エリプソ Dektak 段差計 Tencor 段差計 金属顕微鏡 デジタル顕微鏡 赤外線顕微鏡 ルーザ/白色共焦点顕微鏡 深さ測定装置 超音波顕微鏡 マイクロX線CT 熱電子SEM 断面SEM JEOL FE-SEM 別長SEM クイックコータ パーク・システムズAFM 4探針測定装置 拡がり抵抗測定装置 折かり抵抗測定装置 FIB XRD 直線集束ビーム超音波材料解析システム#1 直線集束ビーム超音波材料解析	マイクロサポート	1,936 6,732 2,728 2,112 1,320 1,606 2,376 2,332 2,002 2,288 1,914 5,610 1,606 2,464 4,004 4,290 5,962 6,072 18,062 1,848 3,674 1,518 2,882 10,010 10,648 3,696	2,574 8,954 3,630 2,794 1,760 2,134 3,146 3,102 2,662 3,036 2,552 7,480 2,134 3,278 5,324 5,698 7,942 8,096 24,068 2,442 4,884 2,002 3,828 13,332 14,190 4,928	3,102 10,758 4,356 3,366 2,112 2,574 3,784 3,740 3,212 3,652 3,080 8,976 2,574 3,938 6,402 6,842 9,548 9,724 28,886 2,948 5,874 2,420 4,598 16,016 17,028 5,918	1,870 6,908 2,816 2,156 1,408 1,672 2,420 2,420 2,046 2,288 1,936 5,654 1,606 2,442 4,136 4,224 6,006 6,160 18,810 1,870 3,630 1,606 2,970 10,670 10,736 3,696	2,264 7,860 3,366 2,600 1,820 2,074 2,912 2,912 2,296 2,802 2,390 6,996 2,054 3,092 5,130 5,188 6,804 7,554 21,088 2,644 4,112 2,180 4,118 12,314 12,910 5,636 5,636	最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大12インチ 最大12インチ 最大12インチ 最大12インチ 最大12インチ 最大12インチ 最大12インチ 最大12インチ 最大12インチ 最大8インチ 最大8インチ 最大8インチ 最大8インチ 最大8インチ 最大8インチ	マイクロスコープー体型マイクロマニピュレーターシステム シリコンウェハや金属薄板の加工 (ガラスなどの透明材料はNG)、最小加工線幅:約70μm ウェハ上のパーティクル測定 (数、大きさ) 光学式の膜厚測定 高速サンプリング可能なエリプソ 薄膜の厚さ、屈折率測定 触針式の表面形状測定 触針式の表面形状測定 にクーン観察 パターン観察 パターン観察 パターン観察 パターン観察、デジタル画像保存、電動ステージ (PC制御可)、20~200倍、500~5000倍 両面アライメントの確認、ウェハ接合面のボイド評価等 3次元表面形状測定、DeepRIEのエッチ深さ測定、レーザ光/白色の切替可能、共焦点/非共焦点の切替可能 光学式の非接触深さ測定装置 デバイス内部の非破壊検査、ウェハ接合面の欠陥、ボイド評価等 X線を用いた非破壊内部観察 EDX付、低真空モード付、光学画像ナビゲーション付 小片専用、インレンズ式の高分解能FESEM 電界放出型SEM、EDX付 微細構造の高精度自動測長 6、8インチは自動搬送、4インチ以下は手動搬送 計測再現性:1nm(3σ) SEM観察試料のPCコーティング 小片から8インチまで対応する原子間力顕微鏡 ウェハ抵抗率などの測定 不純物濃度プロファイルの測定、ウェハを小片にして端面を斜め研磨した後に測定 集束イオンビームによる微小部分のエッチング、SEM観察用断面作製 X線回折測定、1000℃までの高温環境での測定可能 固体試料の漏洩弾性表面波(LSAW)速度測定
測定	F-19 F-20 G-01 G-02 G-03 G-04 G-05 G-06 G-07 G-08 G-10 G-11 G-12 G-13 G-14 G-15 G-16 G-17 G-18 G-17 G-18 G-19 G-20 G-21 G-20 G-21 G-21 G-22 G-23 G-24 G-25 G-26	TU-269 TU-270 TU-301 TU-302 TU-304 TU-305 TU-306 TU-307 TU-308 TU-309 TU-310 TU-311 TU-312 TU-313 TU-314 TU-315 TU-316 TU-317 TU-316 TU-317 TU-320 TU-320 TU-320 TU-321 TU-322 TU-323 TU-324 TU-325 TU-326	マイクロマニピュレータ ウオーターレーザ ウェハゴミ検査装置 膜厚計 卓上型エリプソ エリプソ Dektak 段差計 Tencor 段差計 金属顕微鏡 デジタル顕微鏡 赤外線顕微鏡 レーザ/白色共焦点顕微鏡 マイクロX線CT 熱電子SEM 断面SEM JEOL FE-SEM 別長SEM クイックコータ パーク・システムズAFM 4探針測定装置 拡がり抵抗測定装置 拡がり抵抗測定装置 打形 XRD 直線集束ビーム超音波材料解析システム#1 直線集束ビーム超音波材料解析システム#2 Zygo Nexview	マイクロサポート	1,936 6,732 2,728 2,112 1,320 1,606 2,376 2,332 2,002 2,288 1,914 5,610 1,606 2,464 4,004 4,290 5,962 6,072 18,062 1,848 3,674 1,518 2,882 10,010 10,648 3,696 4,224 2,970	2,574 8,954 3,630 2,794 1,760 2,134 3,146 3,102 2,662 3,036 2,552 7,480 2,134 3,278 5,324 5,698 7,942 8,096 24,068 2,442 4,884 2,002 3,828 13,332 14,190 4,928 5,610 3,938	3,102 10,758 4,356 3,366 2,112 2,574 3,784 3,740 3,212 3,652 3,080 8,976 2,574 3,938 6,402 6,842 9,548 9,724 28,886 2,948 5,874 2,420 4,598 16,016 17,028 5,918 6,732 4,730	1,870 6,908 2,816 2,156 1,408 1,672 2,420 2,420 2,420 2,046 2,288 1,936 5,654 1,606 2,442 4,136 4,224 6,006 6,160 18,810 1,870 3,630 1,606 2,970 10,670 10,736 3,696 4,246 2,772	2,264 7,860 3,366 2,600 1,820 2,074 2,912 2,912 2,912 2,296 2,802 2,390 6,996 2,054 3,092 5,130 5,188 6,804 7,554 21,088 2,644 4,112 2,180 4,118 12,314 12,910 5,636 5,636 4,864	最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大12インチ 最大12インチ 最大12インチ 最大12インチ 最大12インチ 最大12インチ 最大12インチ 最大12インチ 最大12インチ 最大8インチ 最大8インチ 最大8インチ 最大8インチ 最大8インチ 最大8インチ	マイクロスコープー体型マイクロマニピュレーターシステム シリコンウェハや金属薄板の加工(ガラスなどの透明材料はNG)、最小加工線幅:約70μm ウェハ上のパーティクル測定(数、大きさ) 光学式の膜厚測定  酸針式の表面形状測定  酸針式の表面形状測定  所針式の表面形状測定  所針式の表面形状測定  所含力が表面形状測定  所のアライメントの確認、ヴェル接合面のボイド評価等  3次元表面形状測定、DeepRIEのエッチ深さ測定、レーザ光/自色の切替可能、共焦点/非共焦点の切替可能 光学式の非接触深と測定装置 デバイス内部の非破壊検査、ウェル接合面の欠陥、ボイド評価等  X級を用いた非破壊内部観察  EDX付、低真空モード付、光学画像ナピケーション付  小片専用、インレンズ式の高分解能FESEM  電界放出型SEM、EDX付  微細構造の高精度自動搬長  6、8インチは自動搬送、4インチ以下は手動搬送  計測再現性:1nm(3o)  SEM観察試料のPにフティング  小片から8インチまで対応する原子間力顕微鏡  ウェル抵抗率などの測定  不純物濃度プロファイルの測定、ウェルを小片にして端面を斜め研磨した後に測定  集束イオンビームによる微小部分のエッチング、SEM観察用断面作製  X線回折測定、1000でまでの高温環境での測定可能  固体試料のがルフ波(経波、横波)音速測定  麦面形状の精密測定
測定	F-19 F-20 G-01 G-02 G-03 G-04 G-05 G-06 G-07 G-08 G-10 G-11 G-12 G-13 G-14 G-15 G-16 G-17 G-18 G-17 G-18 G-19 G-20 G-21 G-20 G-21 G-21 G-22 G-23 G-24 G-25 G-26	TU-269 TU-270 TU-301 TU-302 TU-304 TU-305 TU-306 TU-307 TU-308 TU-309 TU-310 TU-311 TU-312 TU-313 TU-314 TU-315 TU-316 TU-317 TU-316 TU-317 TU-320 TU-320 TU-320 TU-321 TU-322 TU-323 TU-324 TU-325 TU-326	マイクロマニピュレータ ウォーターレーザ ウェハゴミ検査装置 膜厚計 卓上型エリプソ エリプソ Dektak 段差計 Tencor 段差計 金属顕微鏡 デジタル顕微鏡 赤外線顕微鏡 レーザ/白色共焦点顕微鏡 マイクロX線CT 熱電子SEM 断面SEM JEOL FE-SEM 割長SEM クイックコータ パーク・システムズAFM 4探針測定装置 拡がり抵抗測定装置 拡がり抵抗測定装置 抗アシステムズAFM 4探針測定装置 大RD 直線集東ビーム超音波材料解析システム#1 直線集東ビーム超音波材料解析システム#1 直線集東ビーム超音波材料解析システム#2	マイクロサポート 遊谷工業 LAMICS AQL-1900 トプコン WM-3 ナノメトリクス NanoSpec3000 フォトニックラティス SE-101 アルバック - Dektak 8 Tencor AlphaStep ニコン L150、L200 キーエンス/クノーテクノクラフト - オリンパス/浜松ホトニクス - レーザーテック OPTELICS HYBRID LS-SD ユニオン光学 Hisomet インサイト IS-350 コムスキャンテクノ ScanXmate D160TS110 日立ハイテク S3700N 日立ハイテク S5000 日本電子 JSM-6335F 日立ハイテク CS4800 サンユー電子 SC-701MkII パーク・システムズ NX20  Solid State Measurement SSM150 SII SMI9200 ブルカー・エイエックスエス D8 DISCOVER オリジナル - Zygo	1,936 6,732 2,728 2,112 1,320 1,606 2,376 2,332 2,002 2,288 1,914 5,610 1,606 2,464 4,004 4,290 5,962 6,072 18,062 1,848 3,674 1,518 2,882 10,010 10,648 3,696 4,224	2,574 8,954 3,630 2,794 1,760 2,134 3,146 3,102 2,662 3,036 2,552 7,480 2,134 3,278 5,324 5,698 7,942 8,096 24,068 2,442 4,884 2,002 3,828 13,332 14,190 4,928 5,610	3,102 10,758 4,356 3,366 2,112 2,574 3,784 3,740 3,212 3,652 3,080 8,976 2,574 3,938 6,402 6,842 9,548 9,724 28,886 2,948 5,874 2,420 4,598 16,016 17,028 5,918	1,870 6,908 2,816 2,156 1,408 1,672 2,420 2,420 2,420 2,046 2,288 1,936 5,654 1,606 2,442 4,136 4,224 6,006 6,160 18,810 1,870 3,630 1,606 2,970 10,670 10,736 3,696 4,246	2,264 7,860 3,366 2,600 1,820 2,074 2,912 2,912 2,296 2,802 2,390 6,996 2,054 3,092 5,130 5,188 6,804 7,554 21,088 2,644 4,112 2,180 4,118 12,314 12,910 5,636 5,636	最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大12インチ 最大12インチ 最大12インチ 最大12インチ 最大12インチ 最大12インチ 最大12インチ 最大12インチ 最大12インチ 最大8インチ 最大8インチ 最大8インチ 最大8インチ 最大8インチ 最大8インチ	マイクロスコープー体型マイクロマニピュレーターシステム シリコンウェハや金属薄板の加工(ガラスなどの透明材料はNG)、最小加工線幅:約70μm ウェハ上のパーティクル測定(数、大きさ) 光学式の腹厚測定 高速サンプリング可能なエリプソ 薄膜の厚き、屈折率測定 触針式の表面形状測定  がターン観察、デジタル画像保存、電動ステージ(PC制御可)、20~200倍、500~5000倍 両面アライメントの確認、ウェバ接合面のポイド評価等 3次元表面形状測定、DeepRIEのエッチ深き測定、レーザ光/白色の切替可能、共焦点/非共焦点の切替可能 光学式の非接触深き測定装置 デバイス内部の非破壊検査、ウェバ接合面の欠陥、ポイド評価等 X線を用いた非破壊内部観察 EDX付、低真空モード付、光学画像ナピケーション付 小片専用、インレンズ式の高分解能FESEM 電界放出型SEM、EDX付 微細構造の高精度自動測長 6、8インチは自動験法、4インチ以下は手動搬送 計測再現性:1nm(3の) SEM観察試料のPCコーティング 小片から8インチまで対応する原子間力顕微鏡 ウェバ抵抗率などの測定 不純物濃度プロファイルの測定、ウェバを小片にして端面を斜め研磨した後に測定 集束イオンビームによる微小部分のエッチング、SEM観察用断面作製 X線回折測定、1000でまでの高温環境での測定可能 固体試料のパルク波(縦波、横波)音速測定 固体試料のパルク波(縦波、横波)音速測定
測定	F-19 F-20 G-01 G-02 G-03 G-04 G-05 G-06 G-07 G-08 G-10 G-11 G-12 G-13 G-14 G-15 G-16 G-17 G-18 G-19 G-20 G-21 G-20 G-21 G-20 G-21 G-22 G-23 G-24 G-25 G-26 G-27	TU-269 TU-270 TU-301 TU-302 TU-304 TU-305 TU-306 TU-307 TU-308 TU-310 TU-311 TU-312 TU-313 TU-314 TU-315 TU-316 TU-317 TU-318 TU-317 TU-318 TU-317 TU-321 TU-320 TU-321 TU-322 TU-323 TU-323 TU-324 TU-325 TU-327	マイクロマニピュレータ ウオーターレーザ ウェハゴミ検査装置 膜厚計 卓上型エリプソ エリプソ Dektak 段差計 Tencor 段差計 金属顕微鏡 デジタル顕微鏡 赤外線顕微鏡 レーザ/白色共焦点顕微鏡 マイクロX線CT 熱電子SEM 断面SEM JEOL FE-SEM 別長SEM クイックコータ パーク・システムズAFM 4探針測定装置 拡がり抵抗測定装置 拡がり抵抗測定装置 打形 XRD 直線集束ビーム超音波材料解析システム#1 直線集束ビーム超音波材料解析システム#2 Zygo Nexview	マイクロサポート 遊谷工業 LAMICS AQL-1900 トプコン WM-3 ナノメトリクス NanoSpec3000 フォトニックラティス SE-101 アルバック - Dektak 8 Tencor AlphaStep ニコン L150、L200 キーエンス/クノーテクノクラフト - オリンパス/浜松ホトニクス - レーザーテック OPTELICS HYBRID LS-SD ユニオン光学 Hisomet インサイト IS-350 コムスキャンテクノ ScanXmate D160TS110 日立ハイテク S3700N 日立ハイテク S3700N 日立ハイテク CS4800 サンユー電子 SC-701MkII パーク・システムズ NX20  Solid State Measurement SSM150 SII SMI9200 ブルカー・エイエックスエス D8 DISCOVER オリジナル - Zygo Key Sight B1500A SMU B1511B	1,936 6,732 2,728 2,112 1,320 1,606 2,376 2,332 2,002 2,288 1,914 5,610 1,606 2,464 4,004 4,290 5,962 6,072 18,062 1,848 3,674 1,518 2,882 10,010 10,648 3,696 4,224 2,970	2,574 8,954 3,630 2,794 1,760 2,134 3,146 3,102 2,662 3,036 2,552 7,480 2,134 3,278 5,324 5,698 7,942 8,096 24,068 2,442 4,884 2,002 3,828 13,332 14,190 4,928 5,610 3,938	3,102 10,758 4,356 3,366 2,112 2,574 3,784 3,740 3,212 3,652 3,080 8,976 2,574 3,938 6,402 6,842 9,548 9,724 28,886 2,948 5,874 2,420 4,598 16,016 17,028 5,918 6,732 4,730 2,684	1,870 6,908 2,816 2,156 1,408 1,672 2,420 2,420 2,420 2,046 2,288 1,936 5,654 1,606 2,442 4,136 4,224 6,006 6,160 18,810 1,870 3,630 1,606 2,970 10,670 10,736 3,696 4,246 2,772	2,264 7,860 3,366 2,600 1,820 2,074 2,912 2,912 2,296 2,802 2,390 6,996 2,054 3,092 5,130 5,188 6,804 7,554 21,088 2,644 4,112 2,180 4,118 12,314 12,910 5,636 4,864 2,170	最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大12インチ 最大12インチ 最大12インチ 最大12インチ 最大12インチ 最大12インチ 最大12インチ 最大12インチ 最大12インチ 最大8インチ 最大8インチ 最大8インチ 最大8インチ 最大8インチ 最大8インチ	マイクロスコープー体型マイクロマニピュレーターシステム シリコンウェハや金属薄板の加工(ガラスなどの透明材料はNG)、最小加工線幅:約70μm ウェハ上のパーティクル測定(数、大きさ) 光学式の限厚測定  酸針式の表面形状測定  酸針式の表面形状測定  所針式の表面形状測定  所針式の表面形状測定  所含力がある。アンタル画像保存、電動ステージ(PC制御可)、20~200倍、500~5000倍  両面アライメントの確認、ウェリ接合面のボイド評価等  3次元表面形状測定、DeepRIEのエッチ深さ測定、レーザ光/白色の切替可能、共焦点/非共焦点の切替可能 光学式の非接触深と測定装置 デバイス内部の非破壊検査、ウェリ接合面の欠陥、ボイド評価等  X線を用いた非破壊内部観察  EDX付、低真空モード付、光学画像ナピケーション付  小片専用、インレンズ式の高分解能FESEM  電界放出型SEM、EDX付  微細構造の高精度自動搬送  計測再現性: 1nm(3o)  SEM観察試料のPCコーティング  小片から8インチまで対応する原子間力顕微鏡 ウェハ抵抗率などの測定  不純物濃度プロファイルの測定、ウェハを小片にして端面を斜め研磨した後に測定  集束イオンビームによる微小部分のエッチング、SEM観察用断面作製  X線回折測定、1000でまでの高温環境での測定可能  固体試料のボル沖性表面波(LSAW)速度測定  置体試料のバルク波(縦波、横波)音速測定  麦面形状の精密測定
測定	F-19 F-20 G-01 G-02 G-03 G-04 G-05 G-06 G-07 G-08 G-10 G-11 G-12 G-13 G-14 G-15 G-16 G-17 G-18 G-19 G-20 G-21 G-20 G-21 G-22 G-23 G-24 G-25 G-26 G-27 G-28	TU-269 TU-270 TU-301 TU-302 TU-304 TU-305 TU-306 TU-307 TU-308 TU-310 TU-311 TU-312 TU-312 TU-313 TU-314 TU-315 TU-316 TU-317 TU-317 TU-318 TU-317 TU-321 TU-320 TU-321 TU-322 TU-323 TU-323 TU-324 TU-325 TU-326 TU-327 TU-328	マイクロマニピュレータ ウオーターレーザ ウエハゴミ検査装置 膜厚計 卓上型エリプソ エリプソ Dektak 段差計 Tencor 段差計 金属顕微鏡 デジタル顕微鏡 赤外線顕微鏡 ボ外線顕微鏡 なつが/白色共焦点顕微鏡 深さ測定装置 超音波顕微鏡 マイクロX線CT 熱電子SEM 断面SEM JEOL FE-SEM 別長SEM クイックコータ パーク・システムズAFM 4探針測定装置 拡がり抵抗測定装置 拡がり抵抗測定装置 をおります。 FIB XRD 直線集束ビーム超音波材料解析システム#1 直線集束ビーム超音波材料解析システム#1 互線集束ビーム超音波材料解析システム#2 Zygo Nexview 半導体パラメータアナライザ 2光子励起顕微鏡	マイクロサポート 遊谷工業 LAMICS AQL-1900 トプコン WM-3 ナノメトリクス NanoSpec3000 フォトニックラティス SE-101 アルバック - Dektak 8 Tencor AlphaStep ニコン L150、L200 キーエンス/クノーテクノクラフト - オリンパス/浜松ホトニクス - レーザーデック OPTELICS HYBRID LS-SD ユニオン光学 Hisomet インサイト IS-350 コムスキャンテクノ ScanXmate D160TS110 日立ハイテク S3700N 日立ハイテク S5000 日本電子 JSM-6335F 日立ハイテク CS4800 サンユー電子 SC-701MkII パーク・システムズ NX20  Solid State Measurement SSM150 SII SMI9200 ブルカー・エイエックスエス D8 DISCOVER オリジナル - オリジナル - Zygo Key Sight B1500A SMU B1511B x4 GNDU B1500-66605 ライカ	1,936 6,732 2,728 2,112 1,320 1,606 2,376 2,332 2,002 2,288 1,914 5,610 1,606 2,464 4,004 4,290 5,962 6,072 18,062 1,848 3,674 1,518 2,882 10,010 10,648 3,696 4,224 2,970 1,672 3,630	2,574 8,954 3,630 2,794 1,760 2,134 3,146 3,102 2,662 3,036 2,552 7,480 2,134 3,278 5,324 5,698 7,942 8,096 24,068 2,442 4,884 2,002 3,828 13,332 14,190 4,928 5,610 3,938 2,222 4,840	3,102 10,758 4,356 3,366 2,112 2,574 3,784 3,740 3,212 3,652 3,080 8,976 2,574 3,938 6,402 6,842 9,548 9,724 28,886 2,948 5,874 2,420 4,598 16,016 17,028 5,918 6,732 4,730 2,684 5,808	1,870 6,908 2,816 2,156 1,408 1,672 2,420 2,420 2,046 2,288 1,936 5,654 1,606 2,442 4,136 4,224 6,006 6,160 18,810 1,870 3,630 1,606 2,970 10,670 10,736 3,696 4,246 2,772 1,584 3,696	2,264 7,860 3,366 2,600 1,820 2,074 2,912 2,912 2,296 2,802 2,390 6,996 2,054 3,092 5,130 5,188 6,804 7,554 21,088 2,644 4,112 2,180 4,118 12,314 12,910 5,636 5,636 4,864 2,170 4,196	最大6インチ 最大12インチ 最大12インチ 最大8インチ 最大8インチ 最大8インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ	マイクロスコープー体型マイクロマビュレーターシステム シリコンクエノドや金属薄板の加工(ガラスなどの透明材料はNG)、最小加工線幅:約70μm ウェノトのバーティクル測定(数、大きさ) 光学式の腹厚測定 高速サンブリング可能なエリブソ 薄膜の厚き、屈折率測定 触針式の表面形状測定 がターン観察 バターン観察 ボーズ面形状測定、ウェハ接合面のボイド評価等 3次元表面形状測定、DeepRIEのエッチ深き測定、レーザ光/白色の切替可能、共集点/非共焦点の切替可能 光学式の非接触深さ測定装置 デバイス内部の非破壊検査、ウェハ接合面の欠陥、ボイド評価等 メ線を用いた非破壊内部観察 EDX付・低真空モード付、光学画像ナビゲーション付 小片専用、インレンズ式の高分解能FESEM 電界放出型SEM、EDX付 効用構造の高精度自動測長 6、8インチは自動脱法、4インチ以下は手動脱送 計測面現性:1nm(3σ) SEM観察試料のPtコーティング 小片が8インチまで対応する原子間力顕微鏡 フェハ抵抗率などの測定 不純物濃度プロファイルの測定、ウェハを小片にして端面を斜め研磨した後に測定 集東イオンビームによる微小部分のエッチング、SEM観察用断面作製 X線回折測定、1000でまでの高温環境での測定可能 固体試料の漏洩弾性表面液(LSAW)速度測定 遺体試料のバルク波(縦波、横波)音速測定 表面形状の精密測定 表面形状の精密測定 半導体デバイスの特性評価 マルチフィトンレーザ顕微鏡システム、超解像オブション付、細胞の高精細蛍光イメージング 測定波長域: 210~1690 nm、入所角可変範囲: 45~90度、ヒーム径: 適常3 mm
測定	F-19 F-20 G-01 G-02 G-03 G-04 G-05 G-06 G-07 G-08 G-10 G-11 G-12 G-13 G-14 G-15 G-16 G-17 G-18 G-19 G-20 G-21 G-20 G-21 G-22 G-23 G-24 G-25 G-26 G-27 G-28	TU-269 TU-270 TU-301 TU-302 TU-304 TU-305 TU-306 TU-307 TU-308 TU-310 TU-311 TU-312 TU-312 TU-313 TU-314 TU-315 TU-316 TU-317 TU-317 TU-318 TU-317 TU-321 TU-320 TU-321 TU-322 TU-323 TU-323 TU-324 TU-325 TU-326 TU-327 TU-328	マイクロマニピュレータ ウォーターレーザ ウェハゴミ検査装置 膜厚計 卓上型エリプソ エリプソ Dektak 段差計 Tencor 段差計 金属顕微鏡 デジタル顕微鏡 赤外線顕微鏡 レーザ/白色共焦点顕微鏡 マイクロX線CT 熱電子SEM 断面SEM JEOL FE-SEM 別長SEM クイックコータ パーク・システムズAFM 4探針測定装置 拡がり抵抗測定装置 打形の抵抗測定装置 を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を	マイクロサポート 遊谷工業 LAMICS AQL-1900 トプコン WM-3 ナノメトリクス NanoSpec3000 フォトニックラティス SE-101 アルバック - Dektak 8 Tencor AlphaStep ニコン L150、L200 キーエンス/クノーテクノクラフト - オリンパス/浜松ホトニクス - レーザーデック OPTELICS HYBRID LS-SD ユニオン光学 Hisomet インサイト IS-350 コムスキャンテクノ ScanXmate D160TS110 日立ハイテク S3700N 日立ハイテク S3700N 日立ハイテク CS4800 サンユー電子 SC-701MkII パーク・システムズ NX20  Solid State Measurement SSM150 SII SMI9200 ブルカー・エイエックスエス D8 DISCOVER オリジナル - オリジナル - Zygo Key Sight B1500A SMU B1511B x4 GNDU B1500-66605	1,936 6,732 2,728 2,112 1,320 1,606 2,376 2,332 2,002 2,288 1,914 5,610 1,606 2,464 4,004 4,290 5,962 6,072 18,062 1,848 3,674 1,518 2,882 10,010 10,648 3,696 4,224 2,970 1,672	2,574 8,954 3,630 2,794 1,760 2,134 3,146 3,102 2,662 3,036 2,552 7,480 2,134 3,278 5,324 5,698 7,942 8,096 24,068 2,442 4,884 2,002 3,828 13,332 14,190 4,928 5,610 3,938 2,222	3,102 10,758 4,356 3,366 2,112 2,574 3,784 3,740 3,212 3,652 3,080 8,976 2,574 3,938 6,402 6,842 9,548 9,724 28,886 2,948 5,874 2,420 4,598 16,016 17,028 5,918 6,732 4,730 2,684 5,808	1,870 6,908 2,816 2,156 1,408 1,672 2,420 2,420 2,046 2,288 1,936 5,654 1,606 2,442 4,136 4,224 6,006 6,160 18,810 1,870 3,630 1,606 2,970 10,670 10,736 3,696 4,246 2,772 1,584 3,696	2,264 7,860 3,366 2,600 1,820 2,074 2,912 2,912 2,296 2,802 2,390 6,996 2,054 3,092 5,130 5,188 6,804 7,554 21,088 2,644 4,112 2,180 4,118 12,314 12,910 5,636 5,636 4,864 2,170 4,196	最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大6インチ 最大12インチ 最大12インチ 最大8インチ 最大8インチ 最大8インチ 最大8インチ 最大8インチ 最大6インチ 最大8インチ 最大8インチ 最大6インチ	マイクロスコープー体型マイクロマニビュレーターシステム シリコンウェバや金属薄板の加工(ガラスなどの透明材料はNG)、最小加工線幅:約70μm ウェバ上のバーティクル測定(数、大きさ) 光学式の展序測定 高速サンプリング可能なエリプソ 薄膜の厚さ、屈折率測定 触針式の表面形状測定  約針式の表面形状測定  がターン観察、デジタル画像保存、電動ステージ(PC制御可)、20~200倍、500~5000倍 両面アライメントの確認、ウェバ接合面のポイド評価等 3次元表面形状測定、DeepRIEのエッチ深さ測定、レーザ光/白色の切替可能、共焦点/射装焦点の別替可能 光学式の非接触深さ測定装置 デバイス内部の非破壊検査、ウェバ接合面の欠陥、ポイド評価等  X線を用いた非破壊内部観察 EDX付、低真空モード付、光学画像ナビゲーション付 小片専用、インレンズ式の高分解能FESEM 電界放出型SEM、EDX付 微細構造の高精度自動測長 6、8インチは自動制度、4インチ以下は手動搬送 計測再現性:1nm(3の) SEM観察試料のPtコーティング 小片から8インチまで対応する原子間力顕微鏡 ウェバ抵抗率などの測定 不純物温度プロファイルの測定、ウェバを小片にして端面を斜め研磨した後に測定 集東イオンビームによる微小部分のエッチング、SEM観察用断面作製  X線回折測定、1000でまでの高温環境での測定可能 固体試料の派池弾性表面波(LSAW)速度測定  表面形状の特空測定  半導体デバイスの特性評価 マルチフィンと、超解像オブション付、細胞の高精細蛍光イメージング